

**Всесоюзный  
Центр  
Переводов**

# **ТЕТРАДИ НОВЫХ ТЕРМИНОВ**

**АНГЛО-РУССКИЕ ТЕРМИНЫ  
ПО ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ  
ENGLISH AND RUSSIAN TERMS:  
OPTOELECTRONICS**



**183**

Государственный комитет СССР  
по науке и технике

Академия наук  
СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ

В помощь переводчику

ТЕТРАДИ НОВЫХ ТЕРМИНОВ  
№ 183  
АНГЛО-РУССКИЕ ТЕРМИНЫ  
ПО ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ

С о с т а в и т е л ь  
к.т.н. Н.А. Соболева

Москва 1991

Ответственный редактор  
И.И. УБИН

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
От составителя .....	3
Английские термины и русские эквива- ленты .....	4
Указатель русских терминов .....	66

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящую тетрадь включены термины по электровакуумным приборам и устройствам, по твердотельной электронике (полупроводниковые материалы и приборы, технология), по оптоэлектронике, квантовой электронике, не вошедшие в англо-русские словари, изданные до 1988 г. Некоторые из известных терминов включены с более точным русским переводом /например, *implanted junction* - не имплантированный переход, а имплантационный - по типу "диффузионный", т.е. переход, сформированный методом ионной имплантации/. При подготовке выпуска использовались главным образом материалы, реферируемые в секторе "Электроника" ВИНТИ. В русских переводах использованы общеизвестные аббревиатуры /ИС, БИС, ОЭС, ИК, УФ, СВЧ, ПЭС, ПТ ЛБВ, ЭЛТ, ФЭУ, ЭОП, МКП, ТПИ, ЦТВ, РЭП/.

Отзывы и замечания по содержанию и оформлению выпуска просьба направлять по адресу: 117218, Москва, В-218, ул.Кржижановского, д.14, корп.1, Всесоюзный центр переводов.

# АНГЛИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ И РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

## А

1. **above bandgap excitation (transition)**  
межзонное возбуждение; межзонный переход
2. **abrasive-jet trimming**  
абразивно-струйная подгонка
3. **accelerated-crucible-rotation technique**  
техника /выращивания кристаллов/ с неравномерным вращением тигля
4. **accordion imager**  
твёрдотельный преобразователь изображения с растягиванием зарядового пакета от каждого элемента
5. **accordion transfer**  
кадрово-строчный перенос
6. **accumulation-mode CCD**  
ПЗС в режиме накопления /заряда/
7. **accumulation-mode device**  
прибор в режиме накопления /объёмного/ заряда
8. **acoustically-sensitive field-effect transistor**  
акусточувствительный полевой транзистор
9. **acoustic-wave oscillator**  
генератор на поверхностных акустических волнах
10. **acoustooptic Bragg cell**  
акустооптическая брэгговская ячейка
11. **acoustooptic light modulator**  
акустооптический модулятор света
12. **acoustooptic tunable filter**  
перестраиваемый акустооптический фильтр
13. **activated reactive evaporation**  
активационное реактивное напыление
14. **active matrix display**  
активный матричный индикатор
15. **additron**  
аддитрон /электронный двухлучевой коммутатор/
16. **adduct-source CVD**  
двухступенчатое химическое осаждение из паровой фазы с двумя источниками

17. adjustable threshold MOS-FET  
МОП-ПТ с регулируемым пороговым напряжением
18. adsorption FET см. open-gate FET
19. adsorption emission  
адсорбцеэмиссия /ионов/
20. adsorption luminescence  
адсорболомлюминесценция
21. alkalimetal dispenser  
диспенсерный источник паров щелочного металла
22. alloy cathode  
сплавной катод
23. alloy-diffused epitaxial process  
эпитаксия с одновременным диффузионным легированием из сплава
24. alloy-diffused junction  
диффузионно-сплавной переход
25. alloy-diffusion technique  
диффузионно-сплавная технология /диффузионное легирование из сплава/
26. ambient-temperature-operation photoresistor  
неохлаждаемый фоторезистор
27. analog photon address  
аналоговый счетчик фотонов
28. angle-resolved electron spectroscopy  
электронная спектроскопия с угловым разрешением
29. antiblooming  
противоореольная защита
30. antidoming coating  
противодоминговое покрытие /предохраняющее от термовспучивания маски/
31. antiglare surface  
поверхность с антибликовым покрытием
32. antimeltback layer  
/барьерный/ слой, предохраняющий от подплавления подложки
33. antimony-tin oxide (ATO)  
оксид сурьмы-олова /прозрачное проводящее покрытие/
34. antimultipactor coating  
покрытие /окна клистроны/, предохраняющее от резонансного СВЧ-разряда
35. antiresonant-reflecting optical waveguide

противорезонансно-отражающий оптический волновод

36. antiresonant waveguide

противорезонансный световод

37. antistokes Raman laser

лазер на антистоксовом комбинационном рассеянии

38. aperture pattern

теневая маска

39. applied-B ion diode

ионный диод с внешним магнитным полем

40. arc evaporator  
дуговой испаритель

41. arsenosilicate glass

мышьяково-силикатное стекло /пассивирующий материал/

42. artmaster  
фотошаблон

43. as-grown crystal

кристалл сразу после выращивания

44. asymmetric Fabry-Perot reflection modulator

асимметричный отражательный модулятор Фабри-Перо

45. asymmetry in modal confinement laser  
лазер с асимметричным распределением мод

46. atom-beam source  
источник пучка атомов

47. atom-beam tube  
атомно-лучевая трубка

48. atomic-layer doping  
легирование слоя атомарной толщины

49. atomic-layer epitaxy  
эпитаксия атомарного слоя

50. atomic-scale etching  
вытравливание /рисунка, в атомарном масштабе

51. atom probe  
атомный зонд

52. atom resolution  
атомарное разрешение /электронного микроскопа/

53. autocatalytic deposition  
автокаталитическое осаждение

54. autoepitaxy  
автоэпитаксия, гомо-эпитаксия

55. avalanche diode cold electron emitter

холодный катод на основе лавинного диода

56. avalanche photo-transistor  
лавинный фототранзистор

57. avalanche resonant pump  
накачка /лазера/ на лавинной частоте

58. axial deposition  
аксиальное осаждение /технология оптического волокна/

59. axial-injection orbitron  
орбитрон с осевой инжекцией

## В

1. back-gated photoconductive detector  
фоторезистор с тыловым затвором

2. background-limited performance  
режим, ограниченный фоном /ОФ-режим фотоприемника/

3. back-lighted thyrottron  
фототиратрон с запуском лазерным облучением тыльной стороны катода

4. back-surface-damage gettering  
геттерирование путем

повреждения тыловой поверхности

5. back-surface reflecting contact  
тыловой отражающий контакт /в солнечных элементах/

6. back-surface reflector cell  
см. rear-surface reflector cell

7. ballistic focusing  
баллистическая фокусировка

8. band discontinuity  
разрыв непрерывности энергетических зон

9. band-edge offset  
сдвиг края энергетической зоны

10. band-to-band absorption  
см. interband absorption

11. bare substrate  
пустая подложка

12. base cap  
опоясывающая базу область

13. base-storage imager  
твердотельный преобразователь изображения с накоплением заряда в области плавающей базы

14. beam addressing  
электронно-лучевая адресация



**15. beam angular spread**  
угловая расходимость  
луча

**16. beam centroid**  
центроид, точка макси-  
мальной интенсивности  
фокусируемого луча

**17. beam equivalent pressure**  
давление, эквивалентное  
плотности молекулярного  
пучка

**18. beam-forming region**  
область формирования  
луча

**19. beam-index display**  
дисплей с электронно-  
лучевой индексацией

**20. beam recrystallization**  
лазерная рекристаллиза-  
ция

**21. bell-bottom photodiode**  
фотодиод /элемент фото-  
диодной матрицы/ колоко-  
лообразной формы, примы-  
кающий основанием к ка-  
налу ПЗС

**22. below band-gap excitation**  
примесное возбуждение

**23. berlox**  
оксид бериллия /BeO/

**24. bias-temperature test**  
термополевые испытания

**25. bioelectric solar cell**  
биофотоэлектрический  
солнечный элемент

**26. bipolar-unipolar negative differential resistance (BUWDR) transistor**  
биполярно-полевой тран-  
зистор с отрицательным  
дифференциальным сопро-  
тивлением

**27. bipotential gun**  
бипотенциальная элект-  
ронная пушка

**28. bi-well CMOS**  
КМОП-структура с двой-  
ным карманом /карман в  
кармане/

**29. blanket coating**  
сплошное покрытие

**30. blanket diffusion**  
диффузия по всей поверх-  
ности

**31. blemish luminescence**  
неравномерная /пятнис-  
тая/ люминесценция

**32. blocked impurity band**  
блокированная примесная  
зона

**33. blocked-impurity-band IR detector**  
приемник ИК-излучения  
с блокированной примес-  
ной зоной

**34. blooming-proof image sensor**  
преобразователь изображения с подавлением блуминга

**35. blooming-proof solid-state image sensor**  
твердотельный преобразователь изображения с подавлением блуминга

**36. blotting**  
размазывание /изображения/

**37. boat-grown crystal**  
кристалл, выращенный в лодочке

**38. bombardment-induced light emission**  
наведенное оптическое излучение

**39. borsenic**  
В-As /бор с мышьяком/

**40. Bridgeman-Stockbarger methode**  
метод /выращивания монокристаллов/ Бриджмена-Стокбаргера

**41. broad-channeled substrate device**  
прибор с широким каналом в подложке

**42. built-on mask**  
наложенная маска /в фотолитографии/

**43. bulk-barrier photodiode**

фотодиод с объемным барьером

**44. bulk-channel CCD**

ПЗС со скрытым /объемным/ каналом

**45. bulk charge transfer device**  
прибор с объемным переносом заряда

**46. bundle-integrated guide**  
интегральный пучковый волновод

**47. buried coarctate mesa-structure**  
скрытая встречная мезаструктура

**48. buried crescent laser**  
лазерный диод со скрытой серповидной активной областью

**49. buried crescent structure**  
скрытая серповидная структура

**50. buried facet**  
зарощенная грань

**51. buried gate**  
скрытый затвор

**52. buried implanted oxide**  
скрытый слой оксида, образованный ионной имплантацией

**53. buried isolation capacitor**  
конденсатор со скрытым изолирующим слоем

54. buried oxide  
скрытый слой оксида

55. buried-oxide  
isolation  
изоляция заглубленным  
слоем оксида

56. buried ridge  
strip (BRS)  
laser  
лазерный диод со скры-  
той гребенчатой полос-  
ковой структурой

57. buried ridge  
structure  
скрытая /заращенная/  
гребенчатая структура

58. buried strip  
heterostructure  
скрытая полосковая ге-  
тероструктура

59. buried structure  
скрытая /заращенная/  
структура

60. buried-via  
connection  
внутренняя перемычка

61. buried wave-  
guide structure  
структура с заращенным  
волноводом

62. burst-mode  
laser  
лазер в режиме генера-  
ции цуга волн

## С

1. camel gate  
затвор на пьедестале

2. cantilever  
structure  
консольная структура  
/лазерного диода/

3. capillary-  
-action shaping  
капиллярный метод выра-  
щивания из расплава  
кристаллов заданной  
формы

4. capillary chan-  
nel-type conduc-  
tivity  
туннельная капиллярная  
проводимость

5. cap(ing) layer  
(material)  
покрывающий слой /мате-  
риал/

6. carbon fibre  
reinforced  
plastic  
пластмасса, армирован-  
ная угольным волокном

7. carbothermic  
reduction  
карботермическое вос-  
становление (Si из  
 $\text{SiO}_2$ )

8. carrier-domain  
magnetometer  
магнетометр на эффекте  
Ганна

9. carrier-induced  
bleaching  
индуцированное носите-  
лями просветление

10. carrier  
pile-up  
эффект переполнения /по-  
тенциальной ямы/ носителями

11. cascade image intensifier  
см. multistage image tube

12. cast silicon  
поликристаллический кремний, полученный из расплава

13. cathode array  
матричный катод

14. cathode micro-protrusions  
микровыступы на поверхности катода

15. cathodochromic CRT  
ЭЛТ с катодохромным экраном

16. cavity-reservoir dispenser cathode  
распределительный катод с запасом эмиссионного вещества

17. Čerenkov free electron laser  
черенковский лазер на свободных электронах

18. chalcogenide glassy semiconductor  
стекловидный халькогенидный полупроводник

19. channel intensifier tube  
канальный усилитель яркости /ЭОП с МКИ/

20. channeled-strip laser  
лазерный диод с полосковой канальной структурой

21. channeled-strip planar laser  
планарный лазерный диод с полосковой канальной структурой

22. channeled substrate device  
прибор с каналом в подложке

23. channeled substrate laser  
лазерный диод с каналом в подложке

24. channeled (-substrate) strip buried heterostructure laser  
лазерный диод со скрытой полосковой гетероструктурой и каналом в подложке

25. channel-stop-defined barrier CCD  
ПЗС со стоп-каналом

26. channel (-type) conductivity  
туннельная проводимость, туннелирование

27. charge build up  
введение заряда

28. charge control ring  
кольцевая структура, ограничивающая растекание зарядов

29. charge-coupled area imager  
матричный преобразователь изображения на ПЗС

30. charge-coupled photodiode array  
фотодиодная матрица с зарядовой связью

31. charge coupling  
зарядовая связь

32. charge-density wave  
волна плотности зарядов

33. charge-domain device  
прибор на зарядовых доменах /на эффекте Ганна/

34. charge-domain filter  
фильтр на зарядовых доменах

35. charge-flow transistor  
транзистор с растеканием заряда

36. charge-injection transistor  
транзистор с инжекцией заряда

37. charge kenotron  
зарядный кенотрон

38. charge-modulation device  
прибор с модуляцией заряда

39. charge-sensitive read-out technique  
зарядочувствительный способ считывания /сигналов/

40. charge-sweep device  
прибор с вытягиванием заряда

41. checker grating  
шахматная дифракционная решетка

42. chemical anorganic deposition  
химическое осаждение из неорганического материала

43. chemical bath deposition  
химическое осаждение из раствора-расплава

44. chemical beam epitaxy  
хемолучевая эпитаксия /комбинации молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паров металлоорганики/

45. chemical epitaxy  
хемозэпитаксия

46. chemical gas transport  
метод химических газотранспортных реакций

47. chemical growth  
химическое выращивание /кристаллов/

48. chemical ion generator  
химический ионный источник

49. chemically-assisted ion-beam etching  
ионнолучевое травление с химическим действием

50. chemically-assisted process

технологический процесс  
с химическим воздействием

**51. chemical organic  
deposition**

химическое осаждение из  
органического соединения

**52. chemical phase  
epitaxy**

химическая парофазная  
эпитаксия

**53. chemical-reac-  
tion sensor**

датчик теплоты химичес-  
ких реакций

**54. chemical trans-  
port reaction**

химическая транспортная  
реакция

**55. chemical  
vapo(u)r  
infiltration**

химическая парофазная  
инфильтрация /в порис-  
тую подложку/

**56. chemical  
vapo(u)r  
transport**

химический паровой  
транспорт

**57. chip-on-glass**

приборный кристалл на  
стекле

**58. chiral liquid  
crystal**

хиральный жидкий  
кристалл

**59. chirping-free  
light source**

бесчирпинговый источ-  
ник излучения

**60. chirp  
modulation**

чирпинг /модуляция не-  
сущей частоты/

**61. cholesteric  
twist cell**

жидкокристаллическая  
ячейка на эффекте скру-  
чивания холестерической  
фазы

**62. chopped  
radiation**

прерываемое /модулиро-  
ванное/ излучение

**63. chrome circuit  
pattern**

хромовый фотошаблон

**64. circular-scan  
streak tube**

хронографический элек-  
тронно-оптический пре-  
образователь /ЭОП/ с  
круговой разверткой

**65. cladde d ridge  
waveguide**

покрытый /плакирован-  
ный/ реберный волновод

**66. clad layer  
(cladding layer)**

плакирующий /выравни-  
вающий/ слой

**67. cleaved-coupled  
cavity**

связанный по сколу ре-  
зонатор

**68. cleaved-coupled-  
cavity laser**

лазерный диод со сколо-  
то-связанным резонато-  
ром

69. cleaved epitaxial film technique (CLEFT)  
техника получения тонких слоев монокристаллического материала путем механического отделения эпитаксиального слоя от многократно используемой подложки

70. climbing dislocation  
переползающая дислокация

71. clipper kenotron  
клипперный кенотрон

72. closed box diffusion  
диффузия в запаянной ампуле

73. closed loop feedback  
замкнутая цепь обратной связи

74. close spaced sublimation  
сублимация /возгонка/ в замкнутом объеме

75. close-spaced vapor transport  
парофазный перенос в замкнутом объеме /при малом расстоянии источник - подложка/

76. CMT (cadmium-mercury telluride)  
теллурид кадмия-ртути /узкозонный полупроводник/

77. coarctate mesastructure  
встречная мезаструктура

78. coaxial transverse junction  
коаксиальный поперечный переход

79. coherent anti-stokes Roman scattering  
когерентное антистоксово комбинационное рассеяние

80. coherent heterointerface  
когерентная гетерограница

81. coherent light valve  
источник когерентного излучения

82. coherent-migration-enhanced epitaxy  
эпитаксия, усиленная когерентной миграцией

83. coherent tilted superlattice  
когерентно-наклонная сверхрешетка

84. collider  
коллайдер

85. colliding-pulse laser  
лазер на встречных пучках

86. color convergence  
рассовмещение цветовых пятен /ТВ/

87. colo(u)r crosstalk  
цветовой смаз /ТВ/

88. colo(u)r-selection electrode  
цветоделительный электрод

89. coma-free deflection yoke  
магнитная отклоняющая система с коррекцией комы

90. composite resonator type semiconductor laser  
полупроводниковый лазер с составным резонатором

91. compositionally-graded layer  
слой с градиентом состава

92. compositionally-modulated structure  
структура с модуляцией состава

93. compositional superlattice  
композиционная сверхрешетка /с модуляцией состава/

94. comprehensive display  
легкочитаемый дисплей

95. compressed-gas insulation  
изоляция сжатым газом

96. conductive transparent coating

прозрачное проводящее покрытие

97. conductively-connected CCD  
прибор с гальванической зарядовой связью

98. constricted heterostructure  
сжатая гетероструктура

99. constricted mesa  
сжатая /суженная/ меза-структура

100. contact-type image sensor  
преобразователь изображения контактного типа

101. contrast-enhanced lithography  
контрастная литография

102. convergence yoke  
магнитная система сведения /ЦТВ/

103. convergent beam imaging  
формирование изображения в сходящихся лучах

104. convergent-flow Pierce gun  
электронная пушка Пирса со сходящимся пучком

105. convoy-electron emission  
эмиссия электронов сопровождения /при ионной бомбардировке мишени/

106. corrosive gas  
агрессивный газ



107. corrugated capacitor (cell)  
гофрированный конденсатор

108. cosvicon  
косвикон /видикон с гетероструктурной мишенью из Se/AsTe

109. counterstreaming electron beam  
встречный электронный пучок

110. coupled-cavity laser  
лазер со связанными резонаторами

111. coupled-cavity TWT  
ЛБВ на цепочке связанных резонаторов

112. coupled quantum wells  
связанные квантовые ямы

113. coupled-well superlattice  
сверхрешетка со связанными квантовыми ямами

114. crossatron  
кроссатрон /газоразрядный коммутатор со скрещенными полями/

115. crossatron modulator switch  
плазменный ключ

116. cross-coupled cavity  
перекрестно-связанный резонатор

117. cross(ed)-field oscillator

СВЧ генераторная лампа М-типа

118. cross(ed)-field photomultiplier  
фотоэлектронный умножитель со скрещенными полями

119. cross-field free electron laser  
лазер на свободных электронах с поперечной накачкой

120. crossguide  
крестообразное волновое соединение

121. cross-sectional transmission electron microscope  
просвечивающий электронный микроскоп в режиме секционного исследования

122. crucible-grown crystal  
кристалл, выращенный в тигле

123. crucible rotation technique  
техника выращивания кристаллов с вращением тигля

124. cup-shaped electrode  
электрод коробчатой формы

125. current-confinement laser  
лазерный диод с ограничением по току

126. current filament  
токовый шнур
127. curvilinear-channel microchannel plate  
микроканальная пластина с криволинейными каналами
128. cusptron  
касptron /гиромagnetрон с большими электронными орбитами/
129. cyclotron resonance ion source  
ионный источник на циклотронном резонансе

## D

1. deep level transient spectroscopy  
релаксационная спектроскопия глубоких уровней
2. deep trench isolation  
изоляция глубокими канавками
3. defect-tolerant technology  
бездефектная технология
4. deflectron  
дефлектрон /передающая ЭЛТ с электростатическим отклонением/
5. delta-doping ( $\delta$ -doping)  
дельта-легирование /ло-

- кализация примеси в слое атомарной толщины/
6.  $\delta$ -doped superlattice  
 $\delta$ -легированная /дельта-легированная/ асимметричная сверхрешетка
7. dendritic-web ribbon  
дендритная лента
8. depressed-collector TWT  
ЛБВ со сниженным потенциалом коллектора
9. depth profile  
глубинное профилирование /распределение легирующей примеси по глубине/
10. dielectric anisotropy liquid crystal  
жидкий кристалл с диэлектрической анизотропией
11. diffused well  
диффузионный карман
12. diffusion doping  
диффузионное легирование
13. diffusion-driven photodetector  
фотоприемник с диффузионным переносом заряда
14. digicon  
(digital image converter)

цифровой преобразователь изображения /диджикон/

15. diode laser  
лазерный диод

16. direct-readout  
image sensor  
преобразователь изображения /ТПИ/ прямого считывания

17. discharge-  
-pumped laser  
лазер с накачкой разрядом

18. dish-shaped  
mask  
вогнутая маска

19. dissipative  
plasma  
диссипативная /рассеянная/ плазма

20. distributed  
Bragg-reflector  
laser  
лазерный диод с распределенным брэгговским отражателем

21. 1D-mapping  
одномерное отображение

22. 2D-mapping  
двумерное отображение

23. domed shadow  
mask  
куполообразная теневая маска

24. doming  
термовспучивание /маски/, доминг

25. doping-(modulated) superlattice

см. modulation-doped  
superlattice

26. double-barrier  
diode  
двухбарьерный диод

27. double-barrier  
quantum well  
двухбарьерная квантовая яма

28. double-barrier  
quantum-well  
energy filter  
фильтр в виде двухбарьерной квантовой ямы

29. double-beam-  
-modulated  
photoconductivity (DBMP)  
метод двухлучевой модуляции фотопроводимости

30. double-channel  
planar buried  
heterostructure  
(DCPBH) (laser)  
двухканальный лазерный диод со скрытой планарной гетероструктурой

31. double-channel  
quantum well  
квантовая яма с двойным каналом

32. double-channel  
structure  
структура с двойным каналом /в подложке/

33. double current  
confinement  
laser  
лазерный диод с двойным ограничением по току

34. double-diffused-  
-drain FET

ПТ со стоком, образован-  
ным двойной диффузией

35. double-layer  
heterojunction

двухслойный гетеропере-  
ход

36. double-level  
metal wiring

двухуровневая металлиза-  
ция

37. drain anti-  
blooming

сток антиблуминга  
/в ПЗС/

38. dry-developed  
resist

резист сухого проявле-  
ния

39. dual ion-beam  
deposition

осаждение с использова-  
нием двух ионных пучков

40. dummy register

холостой регистр /в ПЗС/

41. duopigatron

дуопигатрон /двухкамер-  
ный пеннинговский источ-  
ник ионов/

42. dynamic astigma-  
tism correction

динамическая коррекция  
астигматизма

43. dynamic-scatter-  
ring liquid  
crystal

жидкий кристалл с эффек-  
том динамического рас-  
сеяния

## Е

1. e-beam exposure  
электроннолучевое экс-  
понирование

2. ECR-heating  
нагрев в плазме элект-  
ронного циклотронного  
резонанса /ЭЦР/

3. edge-aligned  
junction  
торцевой переход

4. edge-defined  
film-fed growth  
профилированное выращи-  
вание с помощью формо-  
образователя со щелью  
/модификация метода  
Степанова/

5. edge-emitting  
(electrolumines-  
cent) diode  
светодиод с торцевым  
выводом излучения

6. edge-illuminated  
photodiode  
фотодиод с торцевым  
входом

7. edge-stabilized  
ribbon Si  
ленточный кремний, по-  
лученный методом профи-  
лирования с краевым эф-  
фектом

8. edge-supported  
pulling  
вытягивание /кристал-  
лов/ с фиксированными  
краями

9. elastic  
reflection

упругое отражение

10. elasto-optical  
effect

механооптический эффект

11. electrical  
liquid-phase  
epitaxy (electro-  
liquid phase  
epitaxy)

электрожидкостная эпи-  
таксия

12. electrically-  
pumped micro-  
laser

микролазер с электричес-  
кой накачкой

13. electro-  
absorption

электропоглощение /эф-  
фект Франца-Келдыша/

14. electroabsorp-  
tion avalanche  
photodiode

лавинный электроабсорб-  
ционный фотодиод /ЛФД с  
электропоглощением/

15. electroabsorp-  
tion modulator

электроабсорбционный  
модулятор

16. electrochemical  
etching

электрохимическое трав-  
ление

17. electroepitaxy

электроэпитаксия

18. electrohydro-  
dynamic ion  
source

электродинамический  
ионный источник

19. electromulti-  
vision

электромультивизионная  
система /многофункцио-  
нальный дисплей/

20. electro-arc  
furnace

электродуговая печь

21. electron beam  
addressing

электронно-лучевая адре-  
сация

22. electron-beam  
doping

электронно-лучевая им-  
плантация примеси /из  
нанесенного на поверх-  
ность слоя/

23. electron beam  
epitaxy

эпитаксия с электронно-  
лучевым экспонированием

24. electron-beam  
ion source

электронно-лучевой ис-  
точник ионов

25. electron-beam  
proximity  
printing

электронно-лучевая кон-  
тактная печать

26. electron-beam  
scanning  
display

дисплей на основе плос-  
кого кинескопа

27. electron-beam  
semiconductor  
device

электронно-полупровод-  
никовый прибор /семи-  
проводник/

28. electron-beam  
trimming  
электронно-лучевая под-  
гонка

29. electron cyclo-  
tron deposition  
осаждение /пленок/ в  
плазме электронного цик-  
лотронного резонанса

30. electron field  
emission gun  
автоэмиссионный элект-  
ронный прожектор

31. electron gun  
snubber  
режущее устройство с  
электронной пушкой

32. electronic-  
-grade material  
(Si)  
материал электронного  
качества /годный для  
изготовления полупровод-  
никовых приборов/

33. electronic  
image readout  
считывание сигналов  
электронного изображе-  
ния

34. electron-injec-  
tion laser  
электронно-инжекционный  
лазер

35. electron-optical  
astigmatism  
электронно-оптический  
астигматизм

36. electron-opti-  
cally tunable  
laser  
лазер с электронно-опти-  
ческой перестройкой

37. electron projec-  
tion lithography  
проекционная электроно-  
литография

38. electron shutter  
электронно-оптический  
затвор /модулятор/

39. electron stepper  
установка электронолито-  
графии с пошаговым экс-  
понированием

40. electro-optic  
sampling  
электронно-оптическая  
выборка /метод измере-  
ния быстрогодействия при-  
бора/

41. electro optic  
shutter  
электрооптический зат-  
вор

42. electrostatic  
microchannel  
plate  
микроканальная пластина  
с электростатической  
фокусировкой /электро-  
нов/

43. electrostatic  
pattern yoke  
система электростати-  
ческого отклонения ри-  
сунка

44. embedded  
confining layer  
встроенный ограничиваю-  
щий слой

45. embedded-mirror  
laser  
лазер со встроенным  
зеркальным резонатором

46. embedded strip geometry (structure)  
встроенная полосковая геометрия /структура/

47. embedded strip geometry laser  
лазер со встроенной полосковой структурой

48. emission site  
центр излучения

49. encaps liquid crystal module  
модуль капсулированных жидкокристаллических ячеек

50. encapsulation floating zone  
метод плавающей зоны в герметизированном объеме /выращивания кристаллов/

51. enclosed-through process  
замкнутый технологический процесс /без выноса образцов на воздух/

52. energetic-beam assisted growth  
выращивание с использованием пучка частиц высокой энергии

53. energy well  
энергетическая яма /карман/

54. etched coupled-cavity laser  
лазерный диод с вытравленными связанными резонаторами

55. etched groove substrate  
подложка с вытравленными канавками

56. etched mesa-structure  
вытравленная мезаструктура

57. etched ridge waveguide  
вытравленный реберный волновод

58. etch out and backfill isolation  
изоляция вытравленными канавками, заполненными диэлектриком

59. etch-stop dielectric  
слой диэлектрика, ограничивающий травление

60. etch-stop layer  
слой, ограничивающий травление

61. etch-stop technique  
техника ограничения травления

62. explosive crystallization  
взрывная кристаллизация

63. explosive electron emission  
взрывная электронная эмиссия

64. explosive-emission cathode  
взрывоэмиссионный катод

65. **extern(al)-  
-cavity semi-  
conductor laser**  
полупроводниковый лазер  
с внешним резонатором

## F

1. **featureless  
surface**  
поверхность без структурных особенностей

2. **feedstock**  
исходный материал в технологии

3. **femtodiode**  
фотодиод с фемтосекундным временным разрешением

4. **Fermi-level  
pinning**  
фиксирование /пиннинг/ уровня Ферми

5. **ferroelectric  
ceramic display**  
индикаторная панель на сегнетокерамике

6. **fiberoptic  
image tube**  
модульный ЭОП с волоконно-оптическими связями

7. **fiber Raman laser**  
волоконный лазер на комбинационном рассеянии

8. **field-effect-mode  
liquid crystal**  
жидкий кристалл в режиме полевого рассеяния

9. **field-free  
ion source**

бесполевой ионный источник

10. **field-induced  
junction**  
индуцированный полем переход

11. **field-ion  
emitter**  
полевой эмиттер /источник/ ионов

12. **field-limiting  
ring**  
ограничивающее поле /охранное/ кольцо

13. **filament-  
-assisted CVD**  
химическое осаждение из паровой фазы в присутствии накаливаемой нити

14. **filling factor  
(of array)**  
коэффициент заполнения площади матрицы

15. **finite-beam  
klystron**  
клистрон с конечным пучком

16. **firing through**  
загонка сквозь /слой/

17. **flash CVD**  
вспышечное /импульсное/ химическое осаждение из паровой фазы

18. **flashlamp  
annealing**  
импульсный отжиг с мощностью лампы-вспышки

19. **flat-face tube**  
ЭЛТ с плоским экраном



20. flat mask

натянутая маска

21. flat plate

solar array

плоская солнечная батарея

22. flat screen

display tube

индикаторная ЭЛТ с плоским экраном

23. flat square tube

кинескоп с плоским прямоугольным экраном

24. flat tension

mask CRT

цветной кинескоп с натянутой маской

25. floating zone

метод плавающей зоны /выращивания монокристаллов/

26. float(ing)-zone

crystal

кристалл, выращенный методом плавающей зоны

27. flow-rate modulation

epitaxy

модуляционная парофазная эпитаксия

28. fluorescent indicator

(panel)

люминесцентный индикатор

29. flying-spot

scanning tube

ЭЛТ со сканированием бегущим лучом

30. focal-plane

array (FPA)

фокальная матрица

31. focal-plane

detector

фокальный фотоприемник

32. focused ion-beam

implantation

селективная ионная имплантация сфокусированным ионным пучком

33. focused-ion-beam

lithography

литография сфокусированным пучком ионов

34. focusing mask

фокусирующая маска

35. folded capacitor

cell

динамическая ячейка с щелевым конденсатором

36. forced-air

cooling

охлаждение обдувом

37. fractional-layer

superlattice

ступенчатая сверхрешетка

38. fractoemission

фрактоэмиссия /вид экзотрионной эмиссии/

39. frame transfer

кадровый перенос

40. frame-transfer

imager

преобразователь изображения с кадровым переносом

41. frame tube

кадровый электронно-оптический преобразователь

42. framed via  
обрамленное сквозное  
отверстие /в печатной  
плате/
43. framing camera  
камера с кадровой раз-  
верткой
44. free-electron  
diode oscillator  
диодный СВЧ-генератор  
на свободных электронах
45. frit-sealed  
picture tube  
кинескоп со склеенной  
оболочкой
46. front assembly  
экрано-масочный узел  
/цветного кинескопа/
47. full-color  
panel display  
полноцветная индикатор-  
ная панель
48. full-recessed  
oxide  
полностью заглубленный  
слой оксида
49. full-square  
tube  
кинескоп с полностью  
спрямленными углами эк-  
рана
50. funnel-shaped  
electrode  
конусный /воронкообраз-  
ный/ электрод
51. funnel-shaped  
hole  
коническое отверстие  
/в апертурной маске/

## G

1. gap density  
of stater  
плотность состояний в  
запрещенной зоне
2. gas-discharge  
deposition  
осаждение /пленок/ в  
газовом разряде
3. gas-discharge  
light emitter  
газоразрядный источник  
оптического излучения
4. gaseous field  
ion source  
газополовой ионный ис-  
точник /с полевым вытя-  
гиванием ионов из газа/
5. gas gain  
коэффициент газового  
усиления
6. gas immersion  
diffusion  
диффузия погружением в  
газовую среду
7. gas immersion  
laser diffusion  
диффузия из газовой  
среды, стимулированная  
лазерным излучением
8. gas immersion  
laser doping  
лазерное легирование  
из газовой среды
9. gas-jet-enhanced  
sputtering  
распыление, усиленное  
струей газа

10. gas plasma etching  
газоплазменное травление
11. gas-source molecular-beam epitaxy (G S M B E)  
молекулярно-лучевая эпитаксия с газовым источником
12. gas-tight balloon  
газонепроницаемый баллон
13. gated MCP detector  
стробоскопический детектор на МКП /микроканальной пластине/
14. gated optical imager  
импульсный ЭОП с затвором
15. gated strip proportional detector  
импульсный полосковый пропорциональный детектор /ионизирующих излучений/
16. gated X-ray imager  
импульсный /стробоскопический/ рентгеновский ЭОП
17. glass-fibre-reinforced plastic  
стеклопластик
18. glow-discharge CVD  
химическое осаждение в плазме тлеющего разряда
19. graded barrier varizонный барьер
20. graded barrier laser  
лазерный диод с варизонным барьерным слоем
21. graded barrier quantum well  
квантовая яма с варизонным барьером
22. graded composition super-lattice  
сверхрешетка с градиентом состава
23. graded-gap region  
варизонная область
24. graded-gap structure  
варизонная структура
25. graded-gate-oxide FET  
ПТ с градиентом толщины подзатворного слоя оксида
26. graded index SQW laser  
лазерный диод с одиночной квантовой ямой и градиентом показателя преломления
27. graded-insulator MIS  
МДП-структура с варизонным диэлектриком
28. graded super-lattice  
варизонная сверхрешетка
29. gradient freezing

направленная кристаллизация с градиентом температуры

30. gradient solidification

отверждение в градиенте температуры

31. gradual doping  
градиентное легирование /с градиентом концентрации примеси/

32. grafting  
графт-полимеризация /с затравкой/

33. graphite-intercalation compound  
компаунд с графитовыми включениями

34. grating-coupled laser  
лазер с дифракционной связью

35. grating-coupled surface-emitting (G SE) laser  
излучающий с поверхности лазер с дифракционной связью

36. grid-gated photomultiplier  
фотоэлектронный умножитель с сеточным затвором

37. gyro-amplifier  
гиротронный усилитель

38. gyro-backward-wave tube  
гиро-ЛОВ /лампа обратной волны гиротронного типа/

39. gyroharmonitron  
гирогармонитрон

40. gyroklystron  
гироклистрон

41. gyromagnetron  
гиромagnetрон, касптрон

42. gyromonotron  
гиромонотрон; однорезонаторный гиротрон

43. gyromotron  
релятивистский гиротрон

44. gyropeniotron  
гиропениотрон /СВЧ-генератор/

45. gyro-TWT  
гиро ЛБВ /лампа бегущей волны гиротронного типа/

46. gyrotwistron  
гиротвистрон

## Н

1. halid transport reactor  
транспортный реактор на парах HCl

2.  $H_2$ -diluted sflane  
силан ( $SiH_4$ ), разбавленный водородом

3. helical slow-wave structure  
спиральная замедляющая система

4. helix cathode  
спиральный катод

5. heteroboundary  
гетерограница, граница гетероперехода

6. heteroface  
см. heterointerface

7. heterointerface  
гетерограница

8. heterojunction-  
-contact photo-  
conductor  
фотопроводник /фоторе-  
зистор/ с гетерострук-  
турными контактами

9. heterostructure  
semiconductor  
laser  
лазерный гетеродиод

10. hibricon  
кинескоп с высокой яр-  
костью экрана

11. hillockless  
metallization  
безбугорковая металлиза-  
ция

12. hole-and-slot  
resonator  
резонатор типа щель -  
отверстие

13. hollow-beam gun  
инжектор полого элект-  
ронного пучка

14. hollow-cathode  
ion source  
ионный источник с полым  
катодом

15. hollow electron  
beam  
полый электронный пучок

16. holographic  
alignment  
голографическое совмеще-  
ние

17. holographic  
(photo) litho-  
graphy  
голографическая /фото/  
литография

18. horizontal  
Bridgeman  
горизонтальный метод  
Бриджмена /выращивания  
кристаллов/

19. horizontal CCD  
горизонтальный ПЗС-ре-  
гистр

20. horizontal  
gradient freeze  
кристаллизация в гори-  
зонтальном градиенте  
температуры

21. horizontal  
ribbon growth  
горизонтальное выращи-  
вание лент

22. hot carrier  
tunneling  
injection LED  
светодиод на основе  
туннельной инжекции го-  
рячих носителей

23. hot-wall  
epitaxy  
эпитаксия методом горя-  
чей стенки

24. hydride  
vapo(u)r-phase  
epitaxy  
гидридная парофазная  
эпитаксия

25. hydrothermally-  
grown crystal  
кристалл, выращенный  
методом гидротермально-  
го синтеза

1. IC-grade  
Si wafer  
кремниевая пластина,  
годная для изготовления  
ИС
2. image array  
матричный преобразова-  
тель изображения
3. image display  
device  
формирователь изображе-  
ния
4. image lag  
инерционность /задерж-  
ка/ изображения; после-  
изображение
5. image photon  
detector  
фотоносчетный приемник  
изображения
6. image read-out  
устройство считывания  
сигналов изображения
7. image recording  
система записи изобра-  
жения
8. imaging array  
см. image array
9. imaging display  
device  
устройство отображения
10. immersed  
photodetector  
иммерсионный фотоприем-  
ник
11. implanted  
film (layer)  
слой, легированный ион-

ной имплантацией /ион-  
но-легированный/

12. implanted  
junction  
имплантационный переход  
/сформированный ионной  
имплантацией/
13. implanted  
material  
(ion-implanted)  
ионно-легированный ма-  
териал
14. implant-  
epitaxy  
имплант-эпитаксия /эпи-  
таксия пучком частично-  
ионизированных молекул  
с введением в пучок ато-  
мов примеси/
15. impurity-induced  
layer disorder-  
ring (IILD)  
разупорядочение структу-  
ры слоя, вызванное вве-  
дением примеси
16. In-bump  
technology  
соединение элементов ИС  
с помощью In столбиков
17. index-guided  
inner-strip  
laser  
лазерный диод со встро-  
енным полосковым ди-  
электрическим волново-  
дом
18. index-guided  
inverted laser  
лазерный диод с волно-  
водом с обратным скач-  
ком показателя прелом-  
ления

19. index-guided  
laser  
лазерный диод со встроенным диэлектрическим волноводом

20. index-type  
picture tube  
индексный кинескоп

21. indium-tin  
oxide (ITO)  
оксид индия-олова /прозрачное проводящее покрытие/

22. injection-  
-locked laser-  
-diode array  
лазерная диодная матрица с внешней синхронизацией

23. in-line handling  
поточная обработка /пластин/

24. inner strip  
laser  
лазерный диод с внутренней полосковой структурой

25. inside vapo(u)r-  
-phase oxidation  
внутреннее /под пленкой/ оксидирование из паровой фазы

26. in-situ  
annealing  
отжиг в процессе эпитаксии

27. in-situ  
processing  
замкнутая технология /в замкнутом объеме/

28. integrated  
etalon interference laser  
эталонный лазер со встроенным интерферометром

29. integrated  
optical logic  
device  
интегрально-оптическое логическое устройство

30. intensified  
photodiode  
фотодиод с предусилителем

31. intensified  
solid-state  
camera  
твердотельный преобразователь изображения с усилением яркости на ЭОП

32. interband  
absorption  
межзонное поглощение

33. interconnect  
density  
плотность размещения межсоединений

34. interference  
laser  
лазер со встроенным интерферометром,

35. interference  
photoconductivity  
интерференционная фотопроводимость

36. interleaved  
dielectric  
межслойный диэлектрик

37. interline transfer  
межстрочный перенос  
/в ПЗС/

38. interline transfer imager  
преобразователь изображения с межстрочным переносом

39. internally strained quantum well  
внутренне напряженная  
квантовая яма

40. internal reflection interface laser  
лазерный диод с внутренней отражающей границей

41. intersubband absorption (transition)  
межподзонное поглощение  
/переход/

42. intimate contact  
плотный контакт

43. intraband absorption  
внутризонное поглощение

44. intrinsic gettering  
внутреннее геттерирование, самогеттерирование

45. inverse photoemission  
обращенная фотоэмиссия  
/излучение под действием электронной бомбардировки/

46. inversion-channel FET

ПТ с инверсионным каналом

47. inverted rib waveguide  
обращенный реберный волновод

48. ion-assisted evaporation  
напыление с ионным облучением

49. ion-beam-assisted etching  
ионнолучевое /безмасочное/ травление

50. ion-beam device  
ионно-лучевой прибор

51. ion-beam epitaxy  
ионно-лучевая эпитаксия

52. ion-beam pattern generation  
ионно-лучевое нанесение топологического рисунка

53. ion-beam sputtering  
ионно-лучевое распыление

54. ion-controlled diode  
ионочувствительный диод

55. ion-cyclotron-resonance heating  
разогрев /плазмы/ методом ионного циклотронного резонанса

56. ion-electron emission



ионно-электронная эмиссия

57. ion-exchanged material

материал, полученный методом ионного обмена

58. ion-impact induced radiation

излучение, индуцированное ионной бомбардировкой

59. ion-induced desorption

десорбция, индуцированная ионной бомбардировкой

60. ionized-cluster-beam deposition

осаждение /пленок/ из пучка ионизированных кластеров

61. ion-laser technique

ионно-лазерная технология /ионная имплантация с последующим лазерным отжигом/

62. ion-milled crater

кратер, образующийся при ионной бомбардировке

63. ion mobility spectrometry

спектрометрия подвижности ионов

64. ion probe microscopy

ионно-зондовая микроскопия

65. ion-projection lithography

проекционная ионно-лучевая литография

66. ion projector

ионная пушка

67. ion-sensitive FET

иончувствительный ПТ

68. ion streak camera

ионная хронографическая камера

69. IR-emitting diode

ИК-светодиод

70. IR-image device (sensor)

преобразователь ИК-изображения

71. IR-quenching

ИК-гашение

72. IR (photo) detector

приемник ИК-излучения

73. IR-soldering

пайка ИК-облучением

74. isothermal deposition

изотермическое осаждение

J

1. jumbotron

индикаторная ЭЛТ со сверхбольшим экраном

## К

1. kaufman type  
ion source  
ионный источник Кауфмана
2. kinescope panel  
assembly  
экрано-масочный узел кинескопа
3. klystron  
клистрон /клистрон-тетрод/

## Л

1. laddertron  
ладдертрон /клистрон с  
распределенным взаимодействием/
2. lantanium  
hexaborid  
гексаборид лантана  
/катодный материал/
3. large-screen  
display  
индикатор с большим  
экраном
4. larmatron  
(larmotron)  
квадрупольный электронно-лучевой усилитель
5. laser scanning  
electron micro-  
scope (LASEM)  
растровый электронный  
микроскоп с лазерным  
воздействием на объект  
/ЛАРЭМ/
6. laser activation  
лазерная активация

7. laser-addressed  
liquid-crystal  
display  
жидкокристаллический  
индикатор с лазерной  
адресацией
8. laser CRT  
ЭЛТ с лазерным экраном
9. laser-CVD  
химическое осаждение из  
паровой фазы с лазерной  
стимуляцией
10. laser desorption  
десорбция, стимулированная  
лазерным облучением
11. laser electro-  
-optic-phased  
array device  
(LEOPARD)  
лазерная решетка с элек-  
тронно-оптической фазо-  
вой синхронизацией
12. laser fuse open-  
ing (shorting)  
лазерное пережигание  
/замыкание/ перемычек
13. laser grooving  
лазерное гравирование  
/канавок/
14. laser-heated  
pedestal growth  
выращивание столбиковых  
кристаллов с лазерным  
нагревом пьедестала
15. laser incor-  
poration  
лазерное внедрение  
/примеси/
16. lasernet  
сенсорная лазерная  
система

**17. laser pulsed cathode**  
фотокатод /с отрицательным электронным сродством/ возбуждаемый импульсным лазерным излучением

**18. laser-scanning array**  
матрица, сканируемая лазерным лучем

**19. lasertron**  
лазертрон /импульсный источник электронов с фотокатодом, возбуждаемым лазерным излучением/

**20. laser vacuum epitaxy**  
молекулярно-лучевая эпитаксия с лазерным облучением /в сверхвысоком вакууме/

**21. lasistor**  
лазистор /оптоэлектронный ключ на лазерном диоде/

**22. lateral epitaxy**  
продольное эпитаксиальное разращивание

**23. lateral evanescent-field laser**  
лазерный диод с продольным затухающим полем /с поперечным ограничением/

**24. lateral overgrowth**  
продольное разращивание

**25. lateral resonant-tunneling FET (LARTFET)**  
горизонтальный полевой

транзистор с резонансным туннелированием

**26. lateral surface superlattice**  
продольная поверхностная сверхрешетка

**27. lattice-matched film**  
слой, согласованный с подложкой по параметру решетки

**28. lattice-matched superlattice**  
согласованная сверхрешетка

**29. ledatron**  
ледатрон /ладдертрон/ вариант оротрона /генератор дифракционного излучения мм-диапазона/

**30. leddicon**  
леддикон /плюмбикон с подсветкой мишени/

**31. ledge-channel structure**  
структура с выступающим /приподнятым/ каналом

**32. ledistor**  
ледистор /оптоэлектронный ключ на светодиоде/

**33. levitation epitaxy**  
левитационная эпитаксия

**34. light-coupled switch**  
переключатель с оптической связью

**35. light-intensity modulator**

оптический амплитудный  
модулятор

36. light-quenched  
thyristor

оптически запираемый  
тиристор

37. light-shutter  
image tube

ЭОП с оптическим затво-  
ром

38. light-switching  
array

светоклапанная панель

39. light-trapping  
structure

светоулавливающая струк-  
тура

40. light-triggered  
thyatron

фототиратрон

41. lightwave  
technology

технология оптической  
обработки

42. limited-reaction  
processing

метод ограниченной реак-  
ции /получения резкого  
профиля легирования/

43. limitron

электронный компаратор

44. line-focus tube

рентгеновская трубка со  
штриховым фокусом

45. linescan time

время считывания строки  
/в ТПИ/

46. liquid crystal  
disc memory

жидкокристаллический

/перезаписываемый/  
диск памяти

47. liquid crystal  
image bar

жидкокристаллическая  
светоклапанная решетка  
/для электрофотографии/

48. liquid-crystal  
optical shutter  
array

жидкокристаллическая  
светоклапанная панель

49. liquid crystal  
shutter

жидкокристаллический  
световой клапан

50. liquid crystal  
television

телевидение на жидко-  
кристаллических диспле-  
ях

51. liquid encapsu-  
lated Czoch-  
ralski crystal  
(LEC-crystal)

кристалл, выращенный  
методом чохральского с  
жидкостной герметизаци-  
ей /со слоем жидкого  
расплава/

52. liquid encapsu-  
lation Kyo-  
poulos

метод Киропулоса выра-  
щивания /кристаллов/ с  
жидкостной герметизаци-  
ей

53. liquid metal  
ion source

жидкометаллический ион-  
ный источник

54. liquid-metal vacuum valve  
вентиль с уплотнением жидким металлом

55. liquid-phase electroepitaxy  
жидкофазная электроэпитаксия

56. liquid quenching  
закалка в расплаве

57. loading vane  
нагрузочная ламель

58. localized gain region laser  
лазер с локализованной областью усиления

59. logic thyatron  
логический тиратрон

60. long-period superlattice  
длиннопериодная сверхрешетка

61. loophole  
кольцевидное /петлеобразное/ отверстие

62. loophole photodiode  
фотодиод с кольцеобразным входом

63. low-angle sheet  
малоугловая лента /слой/

64. low-energy-electron-beam irradiation (LEEBI)  
метод облучения пучком медленных электронов

65. lower-twisted nematic

ТВИСТ-нематический жидкий кристалл с малым углом закручивания

66. low/high junction  
изотипный переход с низкой/высокой степенью легирования областей

67. luminescent (fluorescent) solar concentrator  
люминесцентный концентратор солнечного излучения

68. lyotropic liquid crystal  
лиотропный жидкий кристалл

## M

1. magnetically insulated diode  
диод с магнитной изоляцией

2. magnetic-suspension turbomolecular pump  
турбомолекулярный /вакуумный/ насос с магнитной подвеской ротора

3. magnetic-field Czochralsky  
метод Чохральского с приложением магнитного поля

4. magnetoelectric semiconductor device  
магнитоэлектрический полупроводниковый прибор

5. magneto-enhanced chemical vapor deposition  
усиленное магнитным полем химическое осаждение из паровой фазы
6. magneto-orotron  
магнетоорotron
7. magnetron ion etching  
магнетронное ионное травление
8. magnicon  
магникон /новый СВЧ-генератор с круговой разверткой РЭП в статическом магнитном поле/
9. manotron  
манотрон /СВЧ-датчик переменного давления/
10. masked lithography  
литография с маскированием
11. mask frame  
масочный узел, рама /цветного кинескопа/
12. maskless lithography  
безмасочная литография
13. mask mount  
см. mask frame
14. mask misregistering  
неточное совмещение маски
15. mask mounting rail  
см. mask frame
16. mask support frame  
рама крепления маски /цветного кинескопа/
17. mass transport method  
метод массопереноса /выращивания кристаллов/
18. matrix-readout image sensor  
преобразователь изображения /ТПИ/ с матричной системой считывания
19.  $\mu$ c-Si  
микрорекристаллический кремний
20. melt-etched inner-stripe laser  
лазерный диод с вытравленной проплавкой внутренней полосковой структурой
21. melt-etching  
травление проплавкой
22. melt-grown crystal  
кристалл, выращенный из расплава
23. melt spinning growth  
выращивание кристаллов с вращением расплава
24. mercury-sensitized photo-CVD  
сенсibilизированное ртутью фотохимическое осаждение из паровой фазы

25. mesa-guide  
мезаполосковый волновод

26. mesa-guide laser  
лазер с мезаполосковым световодом

27. mesa-strip structure  
мезаполосковая структура

28. mesa-substrate  
мезаструктурная подложка

29. mesh-connected array  
сотовая матрица /СБИС/

30. metal-capillary cathode  
металло-пористый катод

31. metal-clad waveguide  
металлизированный волновод

32. metal-organic-CVD (MO CVD)  
химическое осаждение из паров металлоорганических соединений

33. metal wiring  
металлизация

34. MIAS (metal/insulator/amorphous semiconductor)  
структура металл/диэлектрик/аморфный полупроводник

35. microchannel-plate imager  
ЭОП с микроканальной пластиной

36. microchannel spatial light modulator  
микроканальный пространственный модулятор света

37. microcleaved facets laser  
лазерный диод с микросколотыми гранями

38. microresonator array  
микрорезонаторная решетка /оптическое логическое устройство/

39. microstrip structure  
микрополосковая структура

40. microtron  
микротрон

41. microwave annealing  
СВЧ-отжиг

42. migration-enhanced epitaxy  
миграционная эпитаксия

43. millitron  
лампа бегущей волны мм-диапазона

44. MIM cathode  
холодный катод с МДМ-структурой

45. minority-hole-sinked photodetector  
быстродействующий фоторезистор с затвором для вывода медленных дырок

46. misalignment-  
-correcting  
tension band  
бандаж на ЭЛТ, корректи-  
рующий рассогласование  
электронного и люмино-  
форного пятен

47. mismatch strain  
напряжение /слоев/ из-за  
рассогласования решеток

48. mobility gap  
зона подвижности /в  
аморфных полупроводни-  
ках/

49. modulated-  
-barrier  
structure  
структура с модулирован-  
ной высотой барьера

50. modulated-ion-  
-current pres-  
sure gauge  
модуляционный ионизаци-  
онный манометр

51. modulation-doped  
junction (FET)  
модуляционно-легирован-  
ный переход /ПТ/

52. modulation-doped  
superlattice  
модуляционно-легирован-  
ная сверхрешетка

53. molecular-ion  
implantation  
имплантация молекуляр-  
ных ионов

54. molecular  
photodiode  
молекулярный /электро-  
химический/ фотодиод

55. molecular  
solar cell  
молекулярный солнечный  
элемент /с пленкой ор-  
ганического соединения/

56. monolithic  
integrated  
optoelectronics  
монолитная интегральная  
оптоэлектроника, моно-  
литные ОЭИС

57. monolithic  
PD /FET  
photoreceiver  
монолитное фотоприемное  
устройство: фотодиод с  
предусилителем на ПТ

58. multianode  
microchannel  
plate (array)  
многоанодная микрока-  
нальная пластина /мат-  
рица/

59. multianode  
photomultiplier  
многоанодный ФЭУ

60. multiaperture  
(Kaufmann)  
ion source  
многоапертурный ионный  
источник /Кауфмана/

61. multibeam  
cathode-ray  
tube  
многолучевая ЭЛТ

62. multibeam  
scanner  
многолучевое сканирую-  
щее устройство

63. multibeam  
screen grid



маска многолучевого  
цветного кинескопа

64. multiboard  
многослойная печатная  
плата

65. multicavity  
gyrotron  
многорезонаторный гиро-  
трон

66. multijunction  
stack  
многопереходный каскад  
/блок/

67. multilayer  
ink-jet printing  
многослойная разводка  
струйным нанесением  
проводящей пасты

68. multilayer  
quantum well  
structure  
многослойная квантово-  
размерная структура

69. multilythics  
(multifunctional  
circuits in mono-  
lythic form)  
многофункциональные мо-  
нолитные ИС

70. multiphoton  
ionization  
многофотонная ионизация

71. multipin cathode  
многоострый катод

72. multiple-output  
fiber  
многовыводный световод

73. multi(ple)-  
-quantum well  
heteropipi

структура в виде групп  
квантовых ям (i-типа ,  
разделенных легирован-  
ными (n и p) областями  
большой толщины

74. multiple-strip  
quantum-well  
heterolaser  
многополосковый кванто-  
воразмержный гетеролазер

75. multi(ple)  
quantum-well  
(MQW) structure  
структура с множеством  
квантовых ям /многослой-  
ная квантоворазмержная  
структура/

76. multiple-strip  
structure  
многополосковая струк-  
тура

77. multiple-twisted  
heterostructure  
многократно закрученная  
гетероструктура

78. multiplication  
noise  
лавинный шум

79. multipole  
ion source  
многополюсный ионный  
источник

80. multiplier  
travelling-wave  
phototube  
фотоэлектронный умножи-  
тель бегущей волны  
/фото-ЛБВ/

81. multiquantum  
barrier (MQB)  
барьер в виде сверхре-

шетки из нескольких  
квантовых ям /одинако-  
вой глубины, но различ-  
ного периода/

82. multistage  
image tube  
многокаскадный /много-  
камерный/ ЭОП

83. multitarget  
sputtering  
катодное распыление од-  
новременно нескольких  
мишеней

84. multivalley band  
многодолинная энергетиче-  
ская зона

85. multiwafer  
reactor  
реактор для одновремен-  
ной обработки многих  
пластин

86. multiwire MOS  
structure  
МОП-структура с М-облас-  
тью в виде проволок

87. mushroom-strip  
laser  
лазерный диод с подтрав-  
ленной /грибовидной/  
мезаполосковой структу-  
рой

## N

1. naked quantum  
well  
открытая квантовая яма

2. nanocrystalline  
material  
нанокристаллический ма-  
териал /поликристалли-

ческий с размерами зер-  
ен  $\leq 5$  нм/

3. nanometer  
alignment  
совмещение с точностью  
до 1 нм

4. narrow-stripe  
laser  
лазерный диод с узкопо-  
лосковой структурой

5. near-band-edge  
emission  
краевое излучение

6. nematic curvili-  
near-aligned  
phase  
нематическая криволиней-  
но-выстроенная фаза  
/жидкого кристалла/

7. newcosvicon  
ньюкосвикон /видикон с  
гетероструктурной ми-  
шенью для ЦТВ/

8. newicon  
ньювикон /видикон с ге-  
тероструктурной мишенью/  
для черно-белого ТВ

9. noise-equivalent  
temperature  
difference  
разность температур,  
эквивалентная шуму

10. non-doping  
impurity  
нелегирующая примесь

11. nonevaporable  
getter  
нераспыляемый геттер

12. nonintentionally  
-doped crystal

непреднамеренно легированный кристалл

13. nonoverlapping array

матрица с неперекрывающимися элементами

14. nonslotted (smooth) anode

сплошной /неразрезной/ анод /магнетрона/

15. nonwiggler free-electron laser

безвигглеровый лазер на свободных электронах

16. normalized photoconductivity

нормализованная фотопроводимость /произведение квантовой эффективности, подвижности и времени жизни носителей/ ( $\eta \mu \tau$ )

17. normal superlattice

нормальная /ненапряженная/ сверхрешетка

18. notched photoresistor

фоторезистор с активной областью в выемке

## О

1. offset, aperture

выходное отверстие

2. offset-coupled laser array

лазерная решетка со смещенными связями

3. offset local oxidation

контрастное локальное оксидирование

4. oil-free vacuum

безмасляный вакуум

5. open-boundary Cerenkov laser

Черенковский лазер с открытой границей

6. open-end Michaelson interferometric laser

лазер с открытым интерферометром Майкельсона

7. open-gate FET  
ПТ с открытым затвором, чувствительный к адсорбции газов

8. opposed-targets sputtering  
катодное распыление мишеней, расположенных по разные стороны от подложки

9. optical annealing  
оптический отжиг

10. optical bistable device  
оптически-бистабильное устройство

11. optical crossbar  
оптическое соединение /перемычка/

12. optical emission spectroscopy  
спектроскопия оптического излучения

13. optical-fiber sensor  
волоконнооптический датчик

14. optical gap  
оптическая ширина запрещенной зоны

15. optical guide  
световод, оптический волновод

16. optical IC  
оптическая интегральная схема

17. optical klystron  
оптический клистрон /лазер на свободных электронах/

18. optically addressed light modulator  
модулятор света с оптической адресацией

19. optically-coupled cavities  
оптически связанные резонаторы

20. optically-pumped laser  
лазер с оптической накачкой

21. optical parametric oscillator  
параметрический генератор оптического излучения

22. optical scanning image sensor  
преобразователь изобра-

жения /ТПИ/ с оптическим сканированием

23. optical shutter array  
см. light-switching array

24. optical splitter  
оптический разветвитель

25. optical tap  
оптический ответвитель

26. optical transfer function  
оптическая передаточная функция

27. optoacoustic deflection  
оптоакустическое отклонение /луча/

28. optoelectronic interface  
оптоэлектронное устройство сопряжения

29. optogalvanic effect  
оптогальванический эффект /в тлеющем разряде/

30. opto-microwave monolithic IC  
(monolithic integration of optical and microwave devices)  
монолитная опто-СВЧ ИС

31. orbitron  
орбитрон

32. orbitron maser  
орбитронный мазер /ге-

нератор электромагнитного излучения при вращении электронов вокруг анода/

**33. organic-CVD**

химическое осаждение из паров органических соединений

**34. organic non-linear optical material**

органический материал с нелинейно-оптическими свойствами

**35. organic photoconductor (OPC)**

органический фотопроводник

**36. orotron**

оротрон /лазер на свободных электронах в режиме интерферометра Фабри-Перо/

**37. orotron oscillator**

генератор оротронного типа

**38. overflow (control) gate**

затвор антиблуминга /в ПЗС/

**39. overflow drain**

сток антиблуминга /в ПЗС/, сток переполнения

**40. oxidation-enhanced diffusion**

диффузия, усиленная оксидированием

**41. oxidation-retarded diffusion**

диффузия, замедленная оксидированием

**Р**

**1. paratron**

паратрон /высоковольтный вакуумный источник оптического и рентгеновского излучения/

**2. partially-ionized molecular-beam epitaxy**

эпитаксия частично ионизированным пучком молекул

**3. passivated-emitter solar cell**

солнечный элемент с пассивированным эмиттером

**4. patterned quantum-well array**

структурированная решетка квантовых ям

**5. periodic slot array**

периодическая решетка /отверстий, щелей/

**6. phased linear laser array**

фазированная линейная лазерная решетка

7. phosphor dot  
pitch  
разрешение люминофора  
/шаг штрихов люминофора/

8. photo-acoustic-  
-thermal effect  
термофотоакустический  
эффект

9. photoangular  
effect  
фотоориентационный эф-  
фект /зависимость сигнала  
от угла падения излу-  
чения/

10. photo-assisted  
epitaxy  
оптически-стимулируемая  
эпитаксия

11. photochemical  
machining  
фотохимическая обработ-  
ка

12. photochemical  
passivation  
фотохимическая пассива-  
ция

13. photochemical  
solar cell  
фотохимический солнеч-  
ный элемент

14. photo-CVD  
фотохимическое осажде-  
ние из паровой фазы

15. photoconductive  
switch  
фотопроводниковый пере-  
ключатель

16. photodeposition  
фотоосаждение

17. photodesorption  
фотодесорбция

18. photoemission  
scanning  
spectroscopy  
сканирующая фотоэмисси-  
онная спектроскопия /с  
лазерным зондом/

19. photoelectron  
emission  
фотостимулированная  
экзоэлектронная эмиссия

20. photo-field  
emission  
spectroscopy  
автофотоэмиссионная  
спектроскопия

21. photographic  
printing plate  
фотошаблон

22. photoioniza-  
tion-pumped  
laser  
лазер с фотоионизацион-  
ной накачкой

23. photon  
counting array  
фотонно-счетная матрица

24. photon-coupled  
transistor  
фототранзистор

25. photoparamet-  
ric detector  
фотопараметрический  
детектор

26. photoplastic  
effect  
фотомеханический эф-  
фект

27. photopleochroism  
фотоплеохроизм
28. photorefractive storage  
запоминающее устройство /ЗУ/ на эффекте фотопре-ломления
29. photosimistor  
фотосимистор /оптически управляемый вентиль/
30. photothermal reflectance (PTR)  
коэффициент фототермического отражения
31. photothermoluminescence  
фототермолюминесценция
32. phototriac  
фототриак /симметричный триодный фототиристор/
33. phototron  
фототрон /преобразова-тель оптического излу-чения в СВЧ-колебания/
34. physical vapor deposition (transport)  
физическое осаждение из паровой фазы
35. piezoelectrically generated asymmetric quantum well  
асимметричная пьезоэлек-трическая квантовая яма
36. piezomagnetic device  
пьезомагнитный прибор
37. pinch-reflex ion diode  
газоразрядный отража-тельный пинч-диод
38. pin quantum-well device  
прибор с квантовораз-мерной pin-структурой
39. planar buried heterostructure  
планарная скрытая /за-ращенная/ гетерострук-тура
40. planar doping  
см. atomic-layer doping
41. planar injection laser  
планарный инжекционный лазерный диод
42. planarization by reflow  
планаризация растекани-ем
43. planar-mesa  
мезапланарная техноло-гия
44. planar strip laser  
планарный полосковый лазерный диод
45. planar strip structure  
планарная полосковая структура
46. planistor (planar resistor)  
планарный резистор
47. plasma-assisted (activated) CVD (plasma-CVD)

плазмохимическое осаждение из паровой фазы

48. plasma doping  
плазменное легирование

49. plasma-erosion  
opening switch  
плазменный эрозионный  
размыкатель

50. plasma sputter  
ion source  
ионный источник на основе  
плазменного распыления  
мишени

51. plasma-stream  
oxidation  
оксидирование в потоке  
СВЧ-плазмы

52. Pockels optical  
modulator  
оптический модулятор на  
эффекте Поккельса

53. polarimetric  
photodetector  
поляризметрический фото-  
приемник

54. polarization  
photosensitivity  
фотополяризационная  
чувствительность

55. polarization-  
sensitive  
photodetector  
поляризационно-чувствительный  
фотоприемник

56. polistor  
полистор /многоуровневый  
полупроводниковый элемент/

57. polydeposition  
многократное осаждение

58. polymer dispersed  
liquid  
crystal  
жидкий кристалл, диспергированный в полимерной матрице

59. polysilicon  
selfaligned  
technology  
технология структур с  
самосовмещением затвора  
из поликремния

60. positron  
microscope  
позитронный микроскоп

61. portrait-type  
display tube  
кинескоп с экраном вертикального формата

62. post-growth  
hydrogenation  
послеростовая гидрогенизация

63. post-oxidation  
annealing  
послеокислительный отжиг

64. powder electro-  
luminescent  
panel  
электролюминесцентная  
индикаторная панель с  
порошковым люминофором

65. precision  
analog photon  
address  
прецизионный аналоговый  
счет(чик) фотонов

66. precision  
in-line gun  
прецизионный копланарный  
электронный прожектор



67. preferential etching  
ориентированное травление

68. pressed multi-layer cathode  
прессованный многослойный катод

69. pressure-sensitive FET  
ПТ, чувствительный к изменению давления

70. preventing reflection coating  
антибликовое покрытие /экрана кинескопа/

71. proton-exchanged  $\text{LiNbO}_3$  waveguide  
оптический волновод на основе  $\text{LiNbO}_3$ , подвергнутого протонно-обменному воздействию

72. proxicon (proximity-focused image converter)  
бипланарный ЭОП

73. proximity correction  
коррекция эффекта близости

74. proximity-focused (diode) image intensifier  
усилитель яркости изображения с фокусировкой эффектом близости /диодный бипланарный ЭОП/

75. proximity-focused MCP image intensifier  
бипланарный ЭОП с МКП

76. proximity focusing  
фокусировка эффектом близости /бипланарная конструкция/

77. pulsed-jet epitaxy  
импульсная струйная эпитаксия

78. pumped nitrogen cooling  
охлаждение с прокачкой жидкого азота /77-54К/

79. punch-through photodiode  
фотодиод с проникновением поля в базу /с полностью обедненной активной областью/

80. pushbroom mode  
режим построчного сканирования

## Q

1. quad flat pack  
плоский корпус с четырехрядным расположением выводов

2. quadra-potential focus  
квадрупольная фокусирующая система

3. quadrant-anode image sensor  
ЭОП с секторным анодом

4. quadrant detector  
квадрантный позиционно-  
-чувствительный фото-  
приемник

5. quadruple ridged  
waveguide  
квадрупольный гребенча-  
тый волновод

6. quantoscope  
квантоскоп /проеекцион-  
ная ЭЛТ с экраном в ви-  
де матрицы лазерных дио-  
дов с электронной накач-  
кой/

7. quantron  
квантрон /логический  
элемент/

8. quantum barrier  
квантоворазмерный  
барьер

9. quantum box  
трехмерная квантовая  
яма, квантовый ящик

10. quantum confine-  
ment effect  
эффект квантового огра-  
ничения /квантово-огра-  
ниченный эффект/

11. quantum-confined  
Stark effect  
квантово-ограниченный  
эффект Штарка

12. quantum dot  
квантовая точка

13. quantum hetero-  
structure  
квантоворазмерная гете-  
роструктура

14. quantum inter-  
ference device

прибор на основе интер-  
ференции с размерным  
квантованием

15. quantum size  
effect  
эффект размерного кван-  
тования

16. quantum well  
квантовая /потенциаль-  
ная/ яма

17. quantum-well  
box  
см. quantum box

18. quantum well-  
-channel CCD  
ПЗС с квантоворазмерным  
каналом

19. quantum-well  
heterostructure  
(QWH)  
квантоворазмерная гете-  
роструктура

20. quantum-well-  
-integrated  
extern-cavity  
semiconductor  
laser  
полупроводниковый лазер  
/лазерный диод/ с внеш-  
ним резонатором, инте-  
грированный через кван-  
товоразмерную структуру

21. quantum-well  
laser diode  
лазерный диод с кванто-  
воразмерной структурой

22. quantum-well  
structure  
квантоворазмерная струк-  
тура /структура с кван-  
товыми ямами/

23. quantum-well  
waveguide  
квантоворазмерный опти-  
ческий волновод

24. quantum(well)  
wire  
одномерная квантовораз-  
мерная структура /кван-  
товоразмерная проволока/

25. quartz-crystal  
microbalance  
кварцевые микровесы

## R

1. rad-hard device  
радиационно стойкое  
устройство

2. radical-beam  
cleaning  
очистка поверхности пуч-  
ком радикалов

3. radical-beam  
deposition  
осаждение /пленок/ из  
пучка радикалов

4. rainbow  
scattering  
радужное рассеяние

5. Raman free  
electron laser  
лазер на свободных  
электронах на эффекте  
комбинационного рассея-  
ния

6. ramp-assisted  
foil-casting  
technique  
получение кремниевой  
ленты методом литья с  
наклоном

7. rancicon  
раникон /преобразова-  
тель изображения с ре-  
зистивным анодом/

8. rapid thermal  
annealing  
быстрый термический  
отжиг

9. reach-through  
(avalanche)  
photodiode (RAPD)  
/лавинный/ фотодиод в  
режиме проникновения  
поля до подложки /в ре-  
жиме полного обеднения/

10. reactive depo-  
sition epitaxy  
реактивное эпитаксиаль-  
ное осаждение

11. reactive dry  
etching  
реактивное сухое трав-  
ление

12. reactive  
evaporation  
реактивное напыление

13. reactive ion  
plating  
нанесение покрытий ме-  
тодом реактивного ион-  
ного распыления

14. rear-entry  
photodetector  
фотоприемник с тыловым  
освещением

15. rear-projection  
display  
проекционный индикатор  
с просветным экраном

16. rear-surface reflector (solar) cell  
солнечный элемент с отражающей тыловой поверхностью

17. recessed substrate  
заглубленная подложка

18. recoil implantation  
имплантация атомов отдачи /при бомбардировке слоя имплантанта на поверхности/

19. refilled oxide groove isolation  
изоляция вытравленной канавкой, заполненной оксидом

20. resistive-gate structure CCD (RGS-CCD)  
ПЗС с резистивным затвором

21. resonant coherent excitation  
резонансное когерентное возбуждение

22. resonant tunneling  
резонансное туннелирование

23. resonant-tunneling (barrier) diode (RTD)  
диод с резонансным туннелированием сквозь барьер /резонансно-туннельный диод/

24. reticon array

ретикон /самосканирующая диодная матрица/

25. retrograde well  
карман с обратным профилем легирования

26. reverse photolithography  
обратная фотолитография

27. rheotaxy  
реотаксия

28. ribbon-against-drop  
метод нанесения слоя поликремния из расплавленной капли на гибкую графитовую ленту

29. ribbon-to-ribbon  
нанесение слоя поликремния методом "лента к ленте"

30. rib waveguide  
реберный волновод

31. ridge-overgrown structure  
заращенная реберная структура

32. ridge quantum well laser  
лазерный диод с квантоворазмерной структурой и реберным волноводом

33. ridge strip laser  
лазерный диод с гребенчатой полосковой структурой

34. ridge structure laser diode  
лазерный диод с гребенчатым /реберным/ волноводом

35. ridge waveguide  
см. rib waveguide

36. ridge waveguide  
strip quantum-  
-well laser  
лазерный диод с полоско-  
вой квантоворазмерной  
структурой и реберным  
волноводом

37. rippled-field  
magnetron  
магнетрон с азимутально-  
-периодическим магнит-  
ным полем

38. roll coating  
создание покрытий мето-  
дом проката

39. routing mask  
трассировочный фотошаб-  
лон

40. rubicon  
рубикон /модифицирован-  
ный диодикон с диодной  
матрицей на выходе/

## S

1. saddle field  
седловидное поле

2. salicide process  
(self-aligned  
silicidation)  
образование силицида с  
самосовмещением

3. sawtooth  
photodetector  
фотоприемник на струк-  
туре с пилообразным из-  
менением ширины запре-  
щенной зоны

4. sawtooth (doping)  
superlattice  
сверхрешетка с пилооб-  
разным профилем легиро-  
вания /пилообразная ле-  
гированная сверхрешетка/

5. scanning tunne-  
ling microscopy  
сканирующая туннельная  
микроскопия

6. Schottky-barrier  
restriction laser  
лазерный диод с ограни-  
чением /тока/ барьером  
Шоттки

7. Schottky-electron  
emitter  
термополевой катод

8. screening mount  
экрано-масочный узел  
/ЭЛТ/

9. screen-printing-  
-sintering  
technique  
трафаретная печать со  
спеканием

10. secondary-  
-electron  
conductivity  
наведенная проводимость

11. secondary-  
-electron  
spectroscopy  
вторично-электронная  
спектроскопия

12. selecting mask  
цветоделительная маска  
/в цветном кинескопе/

13. selective-area  
epitaxy

селективная /по площади/  
эпитаксия

14. selective epi-  
taxial isolation  
/межэлементная/ изоляция  
методом селективной эпи-  
таксии

15. selective laser-  
ionization  
photodetector  
селективный фотоприем-  
ник на основе лазерной  
ионизации фотовозбужден-  
ных атомов газа /паров  
Na/

16. self-aligned  
strip structure  
самосовмещенная полоско-  
вая структура

17. self alignment  
самосовмещение

18. self-consistent  
technology  
самосогласованная тех-  
нология

19. self electro-  
optic effect  
собственный электроопти-  
ческий эффект

20. self-injection-  
locked laser-  
diode array  
решетка лазерных диодов  
с инжекционной самосин-  
хронизацией

21. self-magneti-  
cally insulated  
diode  
вакуумный диод с магнит-  
ной самоизоляцией

22. selfquenching  
streamer  
самогасящийся стример  
/в разряде/

23. selfscanned  
photodiode  
array  
самосканирующая фото-  
диодная матрица

24. selfshift-type  
gas discharge  
display  
газоразрядная индикатор-  
ная панель /ГИП/ с авто-  
сдвигом /разряда/

25. semiclosed box  
technique  
диффузия методом полу-  
закрытой камеры

26. semiconductor  
piezoresistive  
sensor  
полупроводниковый пьезо-  
резистивный датчик

27. semiplanar  
technology  
полупланарная техноло-  
гия

28. senso-opto-  
electronic  
transducer  
оптоэлектронный датчик,  
чувствительный к возму-  
щениям среды

29. separated  
absorption-  
multiplication  
avalanche  
photodiode  
лавинный фотодиод с раз-  
дельными областями по-  
глощения и умножения

30. separate-confinement-heterostructure (SCH) laser  
лазерный гетеродиод с  
раздельным ограничением  
/РО/

31. separate-source evaporation  
напыление из раздельных  
источников

32. separately-pumped etalon laser  
эталонный лазер с раз-  
дельной накачкой

33. shallow-groove-coupled-cavity laser  
лазерный диод со связан-  
ным по мелкой канавке  
резонатором

34. shielded-substrate injection structure  
структура с защитой от  
инъекции носителей из  
подложки

35. short-cavity laser  
лазер с коротким резо-  
натором

36. short-coupled cavity laser  
лазер с короткосвязан-  
ным резонатором

37. short-period superlattice  
короткопериодная сверх-  
решетка

38. showered ion beam

несфокусированный пу-  
чок ионов /для ионной  
имплантации/

39. sialon  
сиалон /оксинитрид  
кремния-алюминия SiAlON/

40. sidewall-masked isolation  
изоляция с маскировани-  
ем боковых стенок

41. sidewall self-alignment  
боковое самосовмещение

42. signal processing in the element  
обработка сигнала внут-  
ри элемента /в фотопри-  
емных матрицах/; внут-  
реннее интегрирование  
сигнала

43. silicon-in-insulator (in sapphire)  
структура "кремний в  
диэлектрике" /в сапфи-  
ре/

44. silicon intensifier tube  
суперкремникон

45. silicon-on-ceramic  
структура "кремний-на-  
керамике"

46. silicon-on-fabric  
структура "кремний-на-  
ткани"

47. silicon-on-glass (SOG)

структура "кремний-на-стекле"

48. silicon-on-spinel

структура "кремний-на-шпинели"

49. silicon-on-zirconia

структура "кремний-на циркониевой керамике"

50. silicon-rich oxide (nitride)

обогащенный кремнием оксид /нитрид/

51. simistor

симистор /симметричный pnpn тиристор/

52. single-die design

однокристалльная конструкция

53. single-lobed emission

излучение с однолепестковой диаграммой направленности

54. single-lobed pattern

однолепестковая картина /поля/

55. single-lobe operation (of laser)

однолепестковая диаграмма направленности /излучения лазера/

56. single-photon counter

счетчик единичных фотонов

57. single-photon photodetector

фотоприемник с однофотонным разрешением

58. single quantum well (SQW)

одионочная квантовая яма

59. single-quantum-well (SQW) laser

лазерный диод с одионочной квантовой ямой

60. single-stage image tube

одиокамерный ЭОП

61. single-strip laser diode

одиополосковый лазерный диод

62. slit-column pattern

щелевая маска

63. slit-like aperture

щелевая апертура

64. slit scanning

щелевая развертка

65. slit-shape edge-emitting LED

светодиод с торцевым щелевидным окном

66. slotted mask

щелевая маска /в цветном кинескопе/

67. slow-wave deflecting system

замедляюще-отклоняющая система

68. smear camera



камера со щелевой раз-  
верткой

69. smearfree imager  
преобразователь изобра-  
жения без смаза

70. solar-grade  
material (Si,  
GaAs)  
материал, годный для из-  
готовления солнечных  
элементов /солнечного  
качества/

71. solid-phase  
amorphization  
твёрдофазная аморфиза-  
ция

72. solid-phase  
recrystalliza-  
tion  
твёрдофазная рекристал-  
лизация

73. solid-state  
imager (image  
sensor; image  
converter;  
imaging device)  
твёрдотельный преобразо-  
ватель изображения /ТПИ/

74. solid-state  
ion source  
твёрдотельный ионный  
источник

75. solution-grown  
crystal  
кристалл, выращенный  
из раствора

76. space photo-  
voltaics  
космическая фотоэнерге-  
тика

77. spark doping  
электроискровое легиро-  
вание

78. spatial light  
modulator  
пространственный моду-  
лятор света, управляе-  
мый транспарант

79. spectroscopic  
ellipsometry  
спектроэллипсометрия

80. sphericon  
сферикон /СВЧ-генератор  
со сферическими электро-  
дами/

81. spin-on  
загонка /примеси/ цен-  
трифугированием

82. spin-on  
diffusion  
диффузия из пленки, на-  
несенной методом центри-  
фугирования

83. spin-on film  
пленка, полученная мето-  
дом центрифугирования

84. spin-on glass  
загонка стеклянной фрит-  
ты центрифугированием  
/с целью планаризации/

85. spin-on, image  
reversal  
формирование переверну-  
того рисунка методом  
центрифугирования

86. split-gate  
MOS FET  
МОП ПТ с щелевым затво-  
ром /для анализа газов/

87. spray pyrolysis  
струйный пиролиз

88. sputter depth  
profile  
глубинное профилирова-  
ние методом послойного  
катодного распыления

89. stacked CMOS  
КМОП-структура этажерно-  
го типа

90. stacked  
solar cell  
каскадный солнечный  
элемент

91. staircase ava-  
lanche photo-  
diode  
ступенчатый лавинный  
фотодиод

92. staircase  
superlattice  
сверхрешетка ступенчато-  
го типа

93. staring focal-  
-plane array  
следающая фокальная мат-  
рица

94. static-induction  
phototransistor  
фототранзистор со стати-  
ческой индукцией

95. steep-walled  
trench  
канавка с крутыми стен-  
ками

96. step quantum  
well  
ступенчатая квантовая  
яма

97. stepwise mono-  
layer epitaxy  
пошаговая монослойная  
эпитаксия

98. still camera  
камера со ждущей раз-  
верткой

99. Stockbarger  
method  
метод /направленной  
кристаллизации распла-  
ва/ Стокбаргера

100. stop-cleaved  
laser  
лазерный диод со сколо-  
тым резонатором

101. strain-annealed  
crystal  
кристалл, обработанный  
методом деформационного  
отжига

102. strained  
heteroepitaxy  
напряженная гетероэпи-  
таксия /при рассогласо-  
вании решеток/

103. strained  
layer quantum  
wells  
напряженная квантово-  
размерная структура  
/система квантовых ям  
с напряженными слоями/

104. strained  
(-layer)  
superlattice  
напряженная сверхрешет-  
ка

105. streak tube  
хронографический ЭОП

106. stream-grown crystal  
кристалл, выращенный в потоке пара
107. stress-relief oxide  
сглаживающий слой оксида
108. strip buried structure  
скрытая полосковая структура
109. strip planar laser  
лазерный диод с планарной полосковой структурой
110. stripline MCP (microchannel plate)  
полосковая микроканальная пластина
111. subgap photoconductivity  
примесная фотопроводимость
112. submonolayer  
субмонослой
113. substrate mesa-guide  
волноводная мезаструктура в подложке
114. superchalcogen  
суперхалкогон /видикон с гетероструктурной  $\text{CdSeTe/As}_2\text{S}_3/\text{Sb}_2\text{O}_3$  мишенью/
115. superconductive photodetector  
фотоприемник на сверхпроводимости /сверхпроводящий фотоприемник/
116. superconductor-base transistor  
транзистор со сверхпроводящей базой
117. superionic conductor  
суперионный проводник
118. superlattice avalanche photodiode  
лавинный фотодиод со сверхрешеткой
119. superlattice buffer  
буферный слой в виде сверхрешетки
120. superlattice laser  
лазер со сверхрешеткой
121. superlattice photodetector  
фотоприемник со сверхрешеткой
122. superlattice transistor  
транзистор на сверхрешетке
123. superlattice transport photodetector  
фотоприемник с переносом носителей в сверхрешетке
124. superstructure  
сверхрешетка
125. supertwisted nematic liquid crystal  
супертвистированный нематический жидкий кристалл

126. surface-channel  
tunnel junction  
туннельный переход с по-  
верхностным каналом

127. surface-channel  
CCD  
ПЗС с поверхностным ка-  
налом

128. surface-emitting diode  
(laser)  
светодиод /лазер/, излу-  
чающий с поверхности

129. swept-line  
beam  
линейно-развертываемый  
пучок

## T

1. tactile sensor  
array  
тактильная /осязательно-  
чувствительная/ матри-  
ца

2. tape-carrier  
bonding  
монтаж на ленточных но-  
сителях

3. tapered etching  
травление с переменной  
глубиной

4. tapered  
shape layer  
сужающийся к краю слой

5. tapered-thick-  
ness laser  
лазерный диод с посте-  
пенно уменьшающейся  
толщиной активного слоя

6. tapered-thick-  
ness layer  
слой постепенно умень-  
шающейся толщины

7. temperature-  
-gradient  
growing  
выращивание /кристал-  
лов/ в условиях гради-  
ента температуры

8. temperature-  
-oscillating  
method  
метод осциллирующей  
температуры /выращива-  
ния кристаллов/

9. temperature  
quenching  
температурное гашение

10. temperature-  
-sensitive  
parameter  
температуро-чувствитель-  
ный параметр

11. temporal  
response  
быстродействие

12. tension band  
взрывозащитный бандаж  
/на колбе ЭЛТ/

13. tension (foil  
shadow) mask  
натяннутая теневая маска  
/цветного кинескопа/

14. tevatron  
теватрон /синхротрон со  
сверхпроводящими магни-  
тами/

15. thermal CVD  
термохимическое осажде-  
ние из паровой фазы

16. thermal nitridation  
термонитрирование
17. thermal-optical bistable device  
термо-оптический бистабильный элемент
18. thermal-wave imaging  
электронно-акустическая микроскопия
19. thermo-acoustic cell  
термо-акустический элемент
20. thermochromic liquid crystal  
термохромный жидкий кристалл
21. thermodesorption  
термодесорбция
22. thermophotovoltaic effect  
термофотогальванический эффект
23. thermosonic bonding  
ультразвуковая сварка
24. thermotropic liquid crystal  
термотропный жидкий кристалл
25. thin-film electroluminescent display  
тонкопленочная электролюминесцентная индикаторная панель
26. threading dislocation  
нитевидная дислокация
27. Ti-diffused waveguide  
оптический волновод, обработанный диффузией титана
28. tilted substrate  
подложка с поверхностью, ориентированной под углом к оси кристалла
29. tilted superlattice  
наклонная сверхрешетка
30. time-projection chamber  
времена анализирующая камера
31. time resolving  
временное разрешение
32. top-seeded solution growth  
выращивание на затравку из раствора /в расплаве/
33. toroidal grating monochromator (TGM)  
монохроматор с торoidalной дифракционной решеткой
34. transfer modulation function  
частотно-контрастная характеристика /ЭОП/
35. transient photoconductivity  
переходная фотопроводимость

36. translaser  
бистабильный переключатель /транзистор и лазер на общей подложке/

37. transmission secondary-electron multiplier  
вторично-электронный умножитель с прострельными диодами

38. transmutation doping  
трансмутационное /нейтронное/ легирование

39. transverse-excited laser  
/газовый/ лазер с поперечной накачкой

40. transverse-junction strip laser  
лазерный диод с поперечным полосковым переходом

41. transverse mode stabilized laser diode  
лазерный диод со стабилизированной поперечной модой

42. transverse optical klystron  
поперечный оптический клистрон

43. travelling heater method  
метод движущегося нагревателя /жидкофазная рекристаллизация/

44. travelling solvent floating-zone method  
метод /выращивания кристаллов/ плавающей зоны с движущейся областью растворения

45. travelling-wave cathode-ray tube  
ЭЛТ бегущей волны

46. travelling-wave deflection structure  
отклоняющая система с бегущей волной /в осциллографической ЭЛТ/

47. travelling-wave electro-optic modulator  
электрооптический модулятор бегущей волны

48. trenched Schottky barrier  
барьер Шоттки, сформированный в канавке

49. tunable band gap  
перестраиваемая ширина запрещенной зоны

50. tunable birefringence  
регулируемое двулучепреломление

51. tunable twin-guide laser  
перестраиваемый двухволноводный лазер

52. turbuon  
турбуон /мощный источник мм-излучения на турбулентной плазме/

**53. twin-channel  
laser**

лазер со сдвоенным каналом

**54. twin-guide  
laser**

лазер со сдвоенным волноводом

**55. twin planar-  
-strip laser**

лазерный диод с двойной планарной полосковой структурой

**56. twin ridge  
substrate**

подложка с двойной гребенчатой структурой

**57. twin ridge  
substrate laser**

лазерный диод с двойной гребенчатой структурой в подложке

**58. twin-strip  
laser**

лазерный диод со сдвоенной полосковой структурой

**59. twin tub CMOS**

КМОП структура с карманами обоих типов проводимости

**60. twisted hetero-  
structure**

скрученная гетероструктура

**61. twisted double  
heterostructure  
laser**

лазерный диод со скрученной двойной гетероструктурой

**62. two-color  
detector**

двухцветный фотоприемник

**63. two-dimensional  
electron gas  
device**

прибор с двумерным электронным газом

**64. two-photon  
photoemission  
spectroscopy**

двухфотонная фотоэмиссионная спектроскопия

**65. two shaping  
elements growth**

выращивание ленточных кристаллов с протяжкой через 2 формообразующие элемента

**U**

**1. ultrasonic  
imaging**

ультразвуковая система отображения

**2. undercut and  
backfill  
isolation**

изоляция подтравкой и заполнением

**3. undulating frame**  
профилированная рама /меандр/ для маски цветного кинескопа

**4. unidirectional  
solidification**

направленное отверждение

5. unintentional  
doping

непреднамеренное легирование

6. UV-CVD

химическое осаждение из паровой фазы с УФ-облучением

7. UV-to-visible  
converter

преобразователь УФ-излучения в видимое

V

1. vacancy  
microdefect

вакансионный микродефект

2. vacuum chemical  
epitaxy

вакуумная хемоэпитаксия

3. vacuum emission  
эмиссия /горячих электронов/ в вакуум

4. vacuum epitaxy  
вакуумная эпитаксия

5. vacuum image  
pipeline  
вакуумная трубка передачи изображения

6. vacuum UV  
вакуумное /поглощаемое атмосферой/ УФ-излучение

7. vapo(u)r-liquid  
phase epitaxy  
гибридная паро-жидкостная эпитаксия

8. vapo(u)r-liquid-  
-solid (VLS)

method  
выращивание по схеме  
пар-жидкость-кристалл

9. vapo(u)r  
oxidation  
оксидирование в парах  
воды

10. vapo(u)r-phase  
axial deposition with torch  
направленное /осевое/  
осаждение из паровой  
фазы с факелом

11. vapo(u)r-phase  
etching  
парофазное травление

12. vapo(u)r-phase  
regrowth  
парофазная рекристаллизация /разращивание/

13. variable-spaced  
superlattice  
сверхрешетка с переменным периодом

14. variband  
structure  
варизонная структура

15. V-channeled  
substrate  
подложка с V-образным каналом

16. vectorial  
photoeffect  
векториальный фотоэффект

17. vertical-  
-cavity laser  
лазер с вертикальным  
резонатором



**18. vertical CCD**  
вертикальный ПЗС-регистр

**19. vertical format display tube**  
кинескоп с вертикальным экраном

**20. vertical-gradient freeze**  
закалка /пластин/ с вертикальным градиентом температуры

**21. vertical overflow drain**  
вертикальный сток переполнения /в ПЗС/

**22. V-grooved inner-strip structure**  
встроенная в V-образном канале полосковая структура

**23. vibration sensor**  
вибродатчик

**24. vidisector**  
видисектор /диссектор с фотокаатодной сеткой/

**25. viewing threshold**  
порог обнаружения.

**26. vircator**  
виркатор /СВЧ-генераторная лампа с виртуальным катодом/

**27. virtual-phase CCD**  
ПЗС с виртуальной фазой

## W

**1. wakeatron**  
линейный электрон-позитронный коллайдер с ускорением протонных пучков

**2. washer cathode**  
жидкий катод

**3. waveguide optron**  
волстрон /оптрон с волоконнооптической связью/

**4. wavelength-division switching**  
переключение с разделением по спектру

**5. web Si-ribbon**  
ленточный поликристаллический кремний на сетчатой основе

**6. wedge-shaped cathode**  
клиновидный катод

**7. white-light response**  
интегральная чувствительность /фотоприемника/

**8. wide-bandwidth photodetector**  
широкополосный фотоприемник

**9. wiggler**  
вигглер /пространственно-периодическое магнитное поле/

## X

### 1. X-ray

fluorescence

рентгенолюминесценция

### 2. X-ray imager

преобразователь рентгеновского изображения,  
рентгеновский ЭОП

### 3. X-ray

streak tube

времена анализирующий рентгеновский ЭОП

## Y

### 1. yttrium-lanthanum

cathode

иттрий-лантановый катод

## Z

### 1. zigzag-in-line

pack

корпус с зигзагообразным расположением выводов

### 2. Z-MCP

шеvronное сочленение микроканальных пластин

### 3. zone-leveled

crystal

кристалл, легированный методом зонного выравнивания

### 4. zone-leveling

doping

легирование методом зонного выравнивания /распределения примеси/

# УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

## А

автокаталитическое осаждение А 53  
 автоэпитаксия, гомоэпитаксия А 54  
 аддитрон /электронный двухлучевой коммутатор/ А 15  
 адсорбоземиссия /ионов/ А 19  
 аксиальное осаждение /технология оптического волокна/ А 58  
 активационное реактивное напыление А 13  
 акусточувствительный полевой транзистор А 8  
 антибликовое покрытие /экрана кинескопа/ Р 70  
 асимметричная пьезоэлектрическая квантовая яма Р 35  
 асимметричный отражательный модулятор Фабри-Перо А 44  
 атомарное разрешение /электронного микроскопа/ А 52  
 атомно-лучевая трубка А 47

## Б

бандаж на ЭЛТ, корректирующий рассогласование электронного и люминофорного пятен М 46  
 барьер в виде сверхрешетки из нескольких квантовых ям М 81  
 барьер Шотки, сформированный в канавке Т 48  
 биофотоэлектрический солнечный элемент В 25  
 бипланарный ЭОП Р 72  
 бипланарно-полевой транзистор с отрицательным дифференциальным сопротивлением В 26  
 бистабильный переключатель /транзистор и лазер на общей подложке/ Т 36  
 боковое самосовмещение S 41  
 быстродействующий фоторезистор с затвором для вывода медленных дырок М 45

## В

вакуумная трубка передачи изображения V 5  
 вакуумная хемоэпитаксия V 2  
 вакуумный диод с магнитной самоизоляцией S 21  
 варизонная сверхрешетка G 28  
 варизонная структура V 14, V 24  
 вертикальный сток переполнения /в ПЗС/ V 21  
 взрывоземиссионный катод E 64  
 вибродатчик V 23

виркатор /СВЧ-генератор-  
 ная лампа с виртуаль-  
 ным катодом/ V 26  
 внутреннее геттерирова-  
 ние, самогеттерирова-  
 ние I 44  
 внутреннее /под пленкой/  
 оксидирование из па-  
 ровой фазы I 25  
 внутренне напряженная  
 квантовая яма I 39  
 внутренняя перемычка  
 В 60  
 волноводная мезаструкту-  
 ра в подложке S 113  
 волстрон /оптрон с воло-  
 коннооптической свя-  
 зью/ W 3  
 время считывания строки  
 /в ТПИ/ L 45  
 вспышечное /импульсное/  
 химическое осаждение  
 из паровой фазы  
 F 17  
 встречная мезаструктура  
 C 77  
 встроенная полосковая  
 геометрия /структу-  
 ра/ E 46  
 встроенный ограничиваю-  
 щий слой E 44  
 вторично-электронный  
 умножитель с про-  
 стрельными диодами  
 T 17  
 выращивание кристаллов  
 с вращением расплава  
 M 23  
 выращивание на затравку  
 из раствора /в рас-  
 плаве/ T 32  
 выращивание по схеме  
 пар-жидкость-крис-  
 талл V 8  
 выращивание в условиях

градиента температу-  
 ры T 7  
 выращивание ленточных  
 кристаллов с протяж-  
 кой через 2 формооб-  
 разующих элемента  
 T 65  
 выращивание столбиковых  
 кристаллов с лазер-  
 ным нагревом пьеде-  
 стала L 14  
 выравненная мезаструк-  
 тура E 56  
 выравненный реберный  
 волновод E 57  
 вытягивание /кристаллов/  
 с фиксированными  
 краями E 8

## Г

газополевой ионный ис-  
 точник G 4  
 газоразрядная индика-  
 торная панель /ГИП/  
 с автосдвигом /раз-  
 ряда/ S 24  
 газоразрядный отража-  
 тельный пинч-диод  
 P 37  
 геттерирование путем  
 повреждения тыловой  
 поверхности B 4  
 гибридная паро-жидкост-  
 ная эпитаксия V 7  
 гидридная парофазная  
 эпитаксия H 24  
 гирогармонитрон G 39  
 гиромагнетрон /касп-  
 трон/ G 41  
 гиромонотрон, однорезо-  
 наторный гиротрон  
 G 42  
 глубинное профилирова-

ние методом послойного катодного распыления S 88  
 глубинное профилирование /распределение легирующей примеси по глубине/ D 9  
 голографическая фотолитография H 17  
 горизонтальный полевой транзистор с резонансным туннелированием L 25  
 градиентное легирование /с градиентом концентрации примеси/ G 31

## Д

давление; эквивалентное плотности молекулярного пучка B 17  
 двумерное отображение D 22  
 двухбарьерная квантовая яма D 27  
 двухканальный лазерный диод со скрытой планарной гетероструктурой D 30  
 двухступенчатое химическое осаждение из паровой фазы с двумя источниками A 16  
 дельта-легирование /локализация примеси в слое атомарной толщины/ D 5  
 десорбция, индуцированная ионной бомбардировкой I 59  
 длиннопериодная сверхрешетка L 60

диод с резонансным туннелированием сквозь барьер R 23  
 диспенсерный источник паров щелочных металлов A 21  
 диффузионный карман D 11  
 диффузия в запаянной ампуле C 72  
 диффузия, замедленная оксидированием O 41  
 диффузия из газовой среды, стимулированная лазерным излучением G 7  
 диффузия из пленки, нанесенной методом центрифугирования S 82  
 диффузия методом полужакрытой камеры S 25  
 диффузия по всей поверхности B 30  
 диффузия погружением в газовую среду G 6  
 диффузия, усиленная оксидированием O 40  
 дуопигатрон /двухкамерный пеннинговский источник ионов/ D 41

## Ж

жидкий кристалл, диспергированный в полимерной матрице R 58  
 жидкий кристалл с диэлектрической анизотропией D 10

жидкий кристалл в режиме полевого рассеяния F 8  
 жидкий кристалл с эффектом динамического рассеяния D 43  
 жидкокристаллическая светоклапанная панель L 48  
 жидкокристаллическая ячейка на эффекте скручивания холестерической фазы C 6I  
 жидкокристаллический индикатор с лазерной адресацией L 7  
 жидкокристаллический /перезаписываемый/ диск памяти L 46  
 жидкометаллический ионный источник L 53  
 жидкофазная электропитаксия L 55

### 3

заглубленная подложка R 17  
 загонка стеклянной фриты центрифугированием /с целью планаризации/ S 84  
 закалка в расплаве L 56  
 замкнутая технология /в замкнутом объеме/ I 27  
 замкнутый технологический процесс /без выноса образцов на воздух/ E 51  
 заращенная грань B 50  
 заращенная реберная структура R 31

зарядочувствительный способ считывания /сигналов/ C 39  
 затвор антиблуминга /в ПЗС/ O 38  
 затвор на пьедестале C 1  
 зона подвижности /в аморфных полупроводниках/ M 48

### И

излучающий с поверхностью лазер с дифракционной связью G 35  
 излучение с однолепестковой диаграммой направленности S 53  
 изоляция вытравленными канавками, заполненными диэлектриком E 58  
 изоляция вытравленной канавкой, заполненной оксидом R 19  
 изоляция глубокими канавками D 2  
 изоляция заглубленным слоем оксида B 55  
 изоляция с маскированием боковых стенок S 40  
 изоляция подтравкой и заполнением U 2  
 изотипный переход с низкой/высокой степенью легирования областей L 66  
 иммерсионный фотоприемник I 10  
 имплантация атомов отдачи /при бомбардировке слоя имплан-

танта на поверхности/  
R 18

имплантация молекулярных  
ионов M 53

имплантационный переход  
/сформированный ион-  
ной имплантацией/  
I 12

имплант-эпитаксия /эпи-  
таксия пучком частич-  
но-ионизированных мо-  
лекул с введением в  
пучок атомов примеси/  
I 14

импульсная струйная эпи-  
таксия P 77

импульсный ЭОП с затво-  
ром G 14

импульсный /стробоскопи-  
ческий/ рентгеновский  
ЭОП G 16

ионная хронографическая  
камера I 68

ионно-легированный мате-  
риал I 13

ионно-лучевая эпитаксия  
I 51

ионно-лучевое нанесение  
топологического ри-  
сунка I 52

ионно-лучевое /безмасоч-  
ное/ травление I 49

ионно-лучевое травление  
с химическим дейст-  
вием C 49

ионный источник на осно-  
ве плазменного распы-  
ления мишени P 50

моночувствительный  
диод I 54

интерференционная фото-  
проводимость I 35

## К

кадрово-строчный пере-  
нос A 5

кадровый перенос F 39

кадровый ЭОП F 47

канавка с крутыми стен-  
ками S 95

капиллярный метод выра-  
щивания из расплава  
кристаллов заданной  
формы C 3

карботермическое вос-  
становление (Si из  
SiO<sub>2</sub>) C 7

карман с обратным про-  
филем легирования  
R 25

касptron /гиромagnetрон  
с большими электрон-  
ными орбитами/  
C 128

катодное распыление ми-  
шеней, расположенных  
по разные стороны от  
подложки O 8

квадрупольный гребенча-  
тый волновод Q 5

квадрантный позиционно-  
чувствительный фо-  
топриемник Q 4

квадрупольная фокусиру-  
ющая система Q 2

квантовая яма с двойным  
каналом D 31

квантовая яма с варизон-  
ным барьером G 21

квантоворазмерная струк-  
тура /структура с  
квантовыми ямами/  
Q 22

квантовая /потенциаль-  
ная/ яма Q 16

квантоскоп /проекцион-  
ная ЭЛТ с экраном в

виде матрицы лазер-  
 ных диодов с электрон-  
 ной накачкой/ Q 6  
 квантрон /логический  
 элемент/ Q 7  
 клистрод /клистрон-тет-  
 род/ K 3  
 КМПО структура с двой-  
 ным карманом /карман  
 в кармане/ B 28  
 КМОП структура с карма-  
 нами обоих типов про-  
 водимости T 19  
 коаксиальный поперечный  
 переход C 78  
 когерентно-наклонная  
 сверхрешетка C 83  
 кольцевая структура,  
 ограничивающая расте-  
 кание зарядов C 28  
 кольцевидное /петлеоб-  
 разное/ отверстие  
 L 61  
 кампаунд с графитовыми  
 вкраплениями G 33  
 композиционная сверх-  
 решетка /с модуляци-  
 ей состава/ C 93  
 контрастная литография  
 C 101  
 контрастное локальное  
 оксидирование O 3  
 короткопериодная сверх-  
 решетка S 37  
 корпус с зигзагообраз-  
 ным расположением  
 выводов Z 1  
 косвикон /видикон с гетеро-  
 структурной мишенью  
 Se/AsTe/ C 108  
 космическая фотоэнерге-  
 тика S 76  
 коэффициент заполнения  
 площади матрицы  
 F 14

краевое излучение N 5  
 кремниевая пластина,  
 годная для изготов-  
 ления ИС I 1  
 кристалл, выращенный в  
 лодочке B 37  
 кристалл, выращенный в  
 потоке пара S 106  
 кристалл, выращенный в  
 тигле C 122  
 кристаллизация в гори-  
 зонтальном градиенте  
 температуры H 20  
 кристалл, выращенный  
 методом гидротермаль-  
 ного синтеза H 25  
 кристалл, выращенный  
 методом плавающей зо-  
 ны F 26  
 кристалл, выращенный  
 методом Чохральского  
 с жидкостной герме-  
 тизацией /со слоем  
 жидкого расплава/  
 L 51  
 кристалл, выращенный из  
 расплава M 22  
 кристалл, выращенный из  
 раствора S 75  
 кристалл, легированный  
 методом зонного вы-  
 равнивания Z 3  
 кристалл, обработанный  
 методом деформацион-  
 ного отжига S 101  
 кристалл сразу после  
 выращивания A 43  
 куполообразная теневая  
 маска D 23

## Л

лавинный фотодиод в ре-  
 жиме проникновения



- поля до подложки /в режиме полного обеднения/ R 9
- лавинный фотодиод с раздельными областями поглощения и умножения S 29
- лавинный фотодиод со сверхрешеткой S 118
- лавинный фотодиод с электропоглощением E 14
- ладдертрон /клистрон с распределенным взаимодействием/ L 1
- лазерная решетка с электрооптической фазовой синхронизацией L 11
- лазерный диод с варизонным барьерным слоем G 20
- лазерный диод с внутренней полосковой структурой I 24
- лазер со встроенным зеркальным резонатором E 45
- лазерный диод со встроенным полосковым диэлектрическим волноводом I 17
- лазерный диод с вытравленной проплавкой внутренней полосковой структурой M 20
- лазерный диод с гребенчатой полосковой структурой R 33
- лазерный диод с двойной гребенчатой структурой в подложке T 57
- лазерный диод с двойной планарной полосковой структурой T 55
- лазерный диод с квантоворазмерной структурой Q 21
- лазер с мезаполосковым световодом M 26
- лазерный диод с микросколотыми гранями M 37
- лазерный диод с ограничением /тока/ барьером Шоттки S 6
- лазерный диод с одиночной квантовой ямой S 59
- лазерный диод с одиночной квантовой ямой и градиентом показателя преломления G 26
- лазерный диод с планарной полосковой структурой S 109
- лазерный диод с подравленной /грибовидной/ мезаполосковой структурой M 88
- лазерный диод с полосковой квантоворазмерной структурой и реберным волноводом R 36
- лазерный диод с поперечным полосковым переходом T 40
- лазерный диод со связанным по мелкой канавке резонатором S 33
- лазерный диод со сдвоенной полосковой структурой T 58
- лазерный диод со ското-связанным резонатором C 68
- лазерный диод со скрученной двойной гетероструктурой T 61

лазерный диод со скрытой гребенчатой полосковой структурой В 56

лазерный диод со скрытой полосковой гетероструктурой и каналом в подложке С 24

лазерный диод со скрытой серповидной активной областью В 48

лазерный диод с узкополосковой структурой М 4

лазерный гетеродиод с раздельным ограничением /РО/ S 30

лазер с короткосвязанным резонатором S 36

лазер со сверхрешеткой S 120

лазер со сдвоенным волноводом Т 54

лазеротрон /импульсный источник электронов с фотокатодом, возбуждаемым лазерным излучением/ L 19

лазистор /оптоэлектронный ключ на лазерном диоде/ L 21

левитационная эпитаксия L 33

легирование методом зонного выравнивания Z 4

легирование слоя атомарной толщины А 48

леддикон /плюмбикон с подсветкой мишени/ L 30

ледистор /оптоэлектронный ключ на светодиоде/ L 32

ленточный поликристаллический кремний на сетчатой основе W 5

лиотропный жидкий кристалл L 68

люминесцентный концентратор солнечного излучения L 67

## М

магнетоорotron М 6

магнетрон с азимутально-периодическим магнитным полем R 37

магникон /СВЧ-генератор с круговой разверткой релятивистского электронного пучка в статическом магнитном поле/ М 8

материал солнечного качества /годный для изготовления солнечных элементов/ S 70

материал, полученный методом ионного обмена I 57

материал электронного качества /годный для изготовления полупроводниковых приборов/ Е 32

матричный преобразователь изображения на ПЗС С 29

межстрочный перенос /в ПЗС/ I 37

межэлементная изоляция методом селективной эпитаксии S 14

мезаполосковая структура М 27

мезаполосковый волновод  
М 25

метод плавающей зоны с  
движущейся зоной рас-  
творения Т 44

метод Киропулоса с жид-  
костной герметизацией  
L 52

метод массопереноса  
М 17

метод нанесения слоя по-  
ликремния из расплав-  
ленной капли на гиб-  
кую графитовую ленту  
K 28

метод Стокбаргера /на-  
правленной кристалли-  
зации/ S 99

метод ограниченной реак-  
ции /получения резко-  
го профиля легирова-  
ния/ L 42

метод осциллирующей тем-  
пературы /выращивания  
кристаллов/ T 8

метод плавающей зоны  
/выращивания моно-  
кристаллов/ F 25

метод химических газо-  
транспортных реакций  
C 46

метод Чохральского с  
приложением магнит-  
ного поля M 3

миграционная эпитаксия  
M 42

микроканальная пластина с  
криволинейными каналами  
C 127

микроканальный пространствен-  
ный модулятор света M 36

микрополосковая структура  
M 39

микрорезонаторная решетка  
M 38

микротрон M 40

многоанодная микроканальная  
пластина /матрица/ M 58  
многокаскадный /многокамерный/  
ЭОП M 82

многократно закрученная гете-  
роструктура M 77

многолучевое сканирую-  
щее устройство M 62

многолучевая ЭЛТ M 61

многополосковый кванто-  
воразмерный гетеро-  
лазер M 74

многослойная квантово-  
размерная структура  
M 68

многослойная разводка  
струйным нанесением  
проводящей пасты  
M 67

многорезонаторный гиро-  
трон M 65

многофункциональные мо-  
нолитные ИС M 69

модуль капсулированных  
жидкокристаллических  
ячеек E 49

модульный ЭОП с волокон-  
нооптическими связя-  
ми F 6

модулятор света с опти-  
ческой адресацией  
O 18

модуляционная парофаз-  
ная эпитаксия F 27

модуляционно-легирован-  
ная сверхрешетка  
M 52

молекулярно-лучевая эпи-  
таксия с газовым ис-  
точником G 11

молекулярно-лучевая эпи-  
таксия с лазерным об-  
лучением /в сверхвы-  
соком вакууме/ L 20

молекулярный /электро-  
химический/ фотодиод  
М 54  
монокристаллическая опто-СВЧ ИС  
О 30  
монокристаллическое фотоприемное  
устройство: фотодиод  
с предусилителем на  
ПТ М 57  
МОП ПТ с щелевым затво-  
ром /для анализа га-  
зов/ S 86

## Н

нагрев в плазме элект-  
ронного циклотронно-  
го резонанса /ЭЦР/  
Е 2  
накачка /лазера/ на ла-  
виной частоте А 57  
наложенная маска /в фо-  
толитографии/ В 42  
нанесение покрытий мето-  
дом реактивного ион-  
ного распыления  
R 13  
нанокристаллический ма-  
териал /поликристал-  
лический с размерами  
зерен  $\leq 5$  нм/ N 2  
направленная кристалли-  
зация с градиентом  
температуры G 29  
напряжение слоев из-за  
рассогласования реше-  
ток М 47  
напряженная гетероэпи-  
таксия S 102  
напряженная сверхрешет-  
ка S 104  
напыление с ионным об-  
лучением I 48  
нематическая криволиней-

но-выстроенная фаза  
/жидкого кристалла/  
N 6  
несфокусированный пучок  
ионов /для ионной  
имплантации/ S 38  
нормальная /ненапряжен-  
ная/ сверхрешетка  
N 17  
ньювикон /видикон с ге-  
тероструктурной ми-  
шенью/ для черно-бе-  
лого ТВ N 8  
ньюкосвикон /видикон с  
гетероструктурной  
мишенью/ для ЦТВ N 7

## О

обработка сигнала внут-  
ри элемента /внутрен-  
нее интегрирование  
сигнала/ S 42  
образование силицида с  
самосовмещением S 2  
обратная фотолитография  
R 26  
обогащенный кремнием ок-  
сид /нитрид/ S 50  
обращенная фотоэмиссия  
/излучение под дейст-  
вием электронной бом-  
бардировки/ I 45  
обращенный реберный вол-  
новод I 47  
одиночная квантовая яма  
S 58  
однокамерный ЭОП S 60  
однолепестковая диаграм-  
ма направленности  
S 55  
одномерная квантовораз-  
мерная структура  
/квантоворазмерная  
проволока/ Q 24

однополосковый лазерный  
диод S 61  
ограничивающее поле /охранное/ кольцо F 12  
оксид индия-олова /прозрачное проводящее покрытие/ I 21  
оксидирование в потоке СВЧ-плазмы P 51  
оптическая ширина запрещенной зоны O I4  
оптически-стимулируемая эпитаксия P I0  
оптически связанные резонаторы O I9  
оптоэлектронное устройство сопряжения O 28  
оптоэлектронный датчик, чувствительный к возмущениям среды S 28  
орбитронный мазер O 32  
орotron /лазер на свободных электронах в режиме интерферометра Фабри-Перо/ O 36  
осаждение /пленок/ в ЭПР плазме E 29  
осаждение /пленок/ из пучка ионизированных кластеров I 60  
осаждение /пленок/ из пучка радикалов R 3  
отжиг в процессе эпитаксии I 26  
отклоняющая система с бегущей волной /в осциллографической ЭЛТ/ T 46  
открытая квантовая яма N 1

## П

парофазная рекристалли-

разия /разрачивание/ V 12  
парофазное травление V 11  
парофазный перенос в замкнутом объеме /при малом расстоянии источник-подложка/ C 75  
перекрестно-связанный резонатор C II6  
ПЗС с виртуальной фазой V 27  
ПЗС с квантоворазмерным каналом Q 18  
ПЗС с поверхностным каналом S 127  
ПЗС с резистивным затвором R 20  
плакирующий /выравнивающий/ слой C 66  
плазменное легирование P 48  
плазмохимическое осаждение из паровой фазы P 47  
планарная скрытая /заряженная/ гетероструктура P 39  
планарный инжекционный лазерный диод P 41  
планарный полосковый лазерный диод P 44  
пленка, полученная методом центрифугирования S 83  
поверхность без структурных особенностей F 1  
подложка с вытравленными канавками E 55  
подложка с двойной гребенчатой структурой T 56  
подложка с V-образным каналом V 15

подложка с поверхностью,  
ориентированной под  
углом к оси кристал-  
ла Т 28

покрытие /окна клистро-  
на/, предохраняющее  
от резонансного СВЧ-  
разряда А 34

полупроводниковый лазер  
с внешним резонатором,  
интегрированный через  
квантоворазмерную  
структуру Q 20

послеростовая гидрогени-  
зация Р 62

пошаговая монослойная  
эпитаксия S 97

преобразователь изобра-  
жения с кадровым пе-  
реносом F 40

преобразователь изобра-  
жения с межстрочным  
переносом I 38

преобразователь изобра-  
жения с матричной  
системой считывания  
М 18

прецизионный копланар-  
ный электронный про-  
жектор Р 66

приборный кристалл на  
стекле С 17

прибор с вытягиванием  
заряда С 40

прибор с гальванической  
зарядовой связью  
С 97

прибор на зарядовых до-  
менах /на эффекте  
Ганна/ С 33

прибор с квантоворазмер-  
ной pin структурой  
Р 38

прибор с модуляцией за-  
ряда С 38

прибор с объемным пере-  
носом заряда В 45

продольная поверхност-  
ная сверхрешетка  
L 26

продольное эпитаксиаль-  
ное разращивание  
L 22

проекционная ионнолуче-  
вая эпитаксия I 65

просвечивающий электрон-  
ный микроскоп в режи-  
ме секционного иссле-  
дования С 121

профилированная рама  
/меандр/ для маски  
цветного кинескопа  
U 3

профилированное выращи-  
вание с помощью фор-  
мообразователя со  
щелью /модификация  
метода Степанова/  
Е 4

полевой транзистор с от-  
крытым затвором, чув-  
ствительный к адсорб-  
ции газов O 7

## Р

радиационно-стойкое уст-  
ройство R 3

разупорядочение структу-  
ры слоя, вызванное  
введением примеси  
I 15

распределительный катод  
с запасом эмиссионно-  
го вещества С 16

распыление, усиленное  
струей газа G 9

растровый электронный  
микроскоп с лазерным

воздействием на объект /ЛАРЭМ/ L 5  
 реактивное сухое травление R 11  
 реактивное эпитаксиальное осаждение R 10  
 реберный волновод R 30  
 режим /фотоприемника/, ограниченный фоном /ОФ-режим/ В 2  
 режим построчного сканирования Р 80  
 рентгеновская трубка со штриховым фокусом L 44  
 реотаксия R 22  
 ретикон /самосканирующая диодная матрица/ K 24  
 решетка лазерных диодов с инжекционной самосинхронизацией S 20

## С

самосовмещение S 17  
 самосканирующая фото-диодная матрица S 23  
 самосогласованная технология S 18  
 сверхрешетка с градиентом состава G 22  
 сверхрешетка с переменным периодом V 13  
 сверхрешетка с пилообразным профилем легирования S 4  
 сверхрешетка со связанными квантовыми ямами C II3  
 сверхрешетка ступенчатого типа S 92  
 светодиод на основе тун-

нельной инжекции горячих носителей H 22  
 светодиод с торцевым выводом излучения E 5  
 светодиод с торцевым щелевидным окном S 65  
 светоклапанная панель L 38  
 селективная ионная имплантация сфокусированным ионным пучком F 32  
 селективная /по площади/ эпитаксия S 13  
 селективный фотоприемник на основе лазерной ионизации фотовозбужденных атомов газа S 15  
 сжатая /суженная/ меза-структура C 99  
 сиалон /оксинитрид кремния-алюминия/ S 39  
 сканирующая туннельная микроскопия S 5  
 сканирующая фотоэмиссионная спектроскопия /с лазерным зондом/ P I8  
 скрытая встречная меза-структура B 47  
 скрытая /заращенная/ гребенчатая структура B 57  
 скрытая полосковая гетероструктура B 58  
 скрытая серповидная структура B 49  
 скрытый слой оксида, образованный ионной имплантацией B 52

ионно-легированный слой  
I 11  
слой постепенно умень-  
шающейся толщины  
Т 6  
слой с градиентом соста-  
ва С 91  
согласованная /по пара-  
метру решетки/ сверх-  
решетка L 28  
сток антиблуминга /сток  
переполнения/ в ПЗС  
О 39  
структура в виде группы  
квантовых ям i-типа,  
разделенных n и p  
областями большей  
толщины М 73  
структура с выступающим  
/приподнятым/ кана-  
лом L 31  
структура с заращенным  
волноводом В 61  
структура с защитой от  
инжекции носителей  
из подложки s 34  
структура "кремний в ди-  
электрике" /в сапфи-  
ре/ s 43  
структура с множеством  
квантовых ям /много-  
слойная квантовораз-  
мерная структура/  
М 75  
структура с модулирован-  
ной высотой барьера  
М 49  
структурированная решет-  
ка квантовых ям Р 4  
ступенчатая квантовая  
яма s 96  
ступенчатая сверхрешет-  
ка F 37  
сужающийся к краю слой  
Т 5

суперкремникон S 44  
супертвистированный не-  
матический жидкий  
кристалл S 125  
суперхалникон /видикон  
с гетероструктурной  
мишенью/ S 114  
сферикон /СВЧ-генератор  
со сферическими  
электродами/ S 80

## Т

тактильная /осязательно-  
чувствительная/  
матрица Т I  
твердотельный преобразо-  
ватель изображения  
/ТПИ/ S 73  
ТПИ с накоплением заря-  
да в области плаваю-  
щей базы В I3  
ТПИ с подавлением блу-  
минга В 35  
ТПИ с растягиванием за-  
рядового пакета от  
каждого элемента  
А 4  
ТПИ с усилением яркости  
на ЭОП I 31  
твердофазная рекристал-  
лизация S 72  
твист-нематический жид-  
кий кристалл с малым  
углом закручивания  
L 65  
термовспучивание /мас-  
ки/, доминг D 24  
термонитрирование Т I6  
термотропный жидкий  
кристалл Т 24  
термофотогальванический  
эффект Т 22



термохимическое осаждение из паровой фазы  
Т 15

техника /выращивания кристаллов/ с неравномерным вращением тигля А 3

техника получения тонких слоев монокристаллического материала путем механического отделения эпитаксиального слоя от многократно используемой подложки С 69

технология структур с самосовмещением затвора из поликремния Р 59

травление с переменной глубиной Т 3

транзистор на сверхрешетке S 122

трансмутационное /нейтронное/ легирование Т 38

трехмерная квантовая яма /квантовый ящик/ Q 9

туннельный переход с поверхностным каналом S 126

турбутрон /мощный источник мм-излучения на турбулентной плазме/ Т 52

## У

усиленное магнитным полем химическое осаждение из паровой фазы М 5

усилитель яркости изображения с фокусировкой эффектом близости /диодный бипланарный ЭОП/ Р 74

установка электронолитографии с пошаговым экспонированием Е 39

устройство считывания сигналов изображения I 6

## Ф

фазированная линейная лазерная решетка Р 6

физическое осаждение из паровой фазы Р 34

фокальная матрица F 30  
фокальный фотоприемник F 31

фокусировка эффектом близости /бипланарная конструкция/ Р 76

фотодиод колоколообразной формы, примыкающий основанием к каналу ПЗС В 21

фотодиодная матрица с зарядовой связью С 30

фотодиод с предусилителем I 30

фотодиод с проникновением поля в базу /с полнотью обедненной активной областью/ Р 79

фотодиод с фемтосекундным временным разрешением F 3

фотокатод, возбуждаемый  
 импульсным лазерным  
 излучением L 17  
 фоточислительная матрица  
 P 23  
 фоточислительный приемник  
 изображения I 5  
 фотоориентационный эф-  
 фект /зависимость  
 сигнала от угла паде-  
 ния излучения/ P 9  
 фотопараметрический де-  
 тектор P 25  
 фотоприемник на структу-  
 ре с пилообразным из-  
 менением ширины за-  
 прещенной зоны S 3  
 фотоприемник с диффузи-  
 онным переносом заря-  
 да D 13  
 фотоприемник с однофо-  
 тонным разрешением  
 S 57  
 фотоприемник с перене-  
 сом носителей в  
 сверхрешетке S 123  
 фотоприемник со сверх-  
 решеткой S 121  
 фотопроводник /фоторе-  
 зистор/ с гетеростру-  
 ктурными контактами  
 H 8  
 фототриак /симметричный  
 триодный фототири-  
 стор/ P 32  
 фототрон /преобразова-  
 тель оптического из-  
 лучения в СВЧ-колеба-  
 ния/ P 33  
 фотохимическое осажде-  
 ние из паровой фазы  
 P 14  
 фотоэлектронный умножи-  
 тель бегущей волны  
 /фото-ЛБВ/ M 80

ФЭУ со скрещенными по-  
 лями C II 8  
 фрактоэмиссия /вид эк-  
 зоэлектронной эмис-  
 сии/ F 38

## X

хемозепитаксия C 45  
 хемолучевая эпитеаксия  
 /комбинация молеку-  
 лярно-лучевой эпитеак-  
 сии и химического  
 осаждения из паров  
 металлоорганики/  
 C 44  
 химическая паровая  
 инфильтрация /в по-  
 ристую подложку/  
 C 55  
 химическая паровая  
 эпитеаксия C 52  
 химическое осаждение в  
 плазме тлеющего раз-  
 ряда G 18  
 химическое осаждение из  
 паров металло-органи-  
 ческих соединений  
 M 32  
 химическое осаждение из  
 паров органических  
 соединений O 33  
 химическое осаждение из  
 паровой фазы в при-  
 сутствии накаливаемой  
 нити F 13  
 химическое осаждение из  
 паровой фазы с лазер-  
 ной стимуляцией L 9  
 химическое осаждение из  
 паровой фазы с УФ-  
 облучением U 6  
 химическое осаждение из  
 раствора-раствора C 43

хиральный жидкий кристалл С 58  
холодный катод на основе лавинного диода А 55  
хронографический ЭОП с круговой разверткой С 64

## Ц

цветной кинескоп с натянутой маской F 24  
цветоделительная маска /в цветном кинескопе/ S 12  
цифровой преобразователь изображения /диджикон/ D 14

## Ч

частотно-контрастная характеристика T 34

## Ш

шевронное сочленение микроканальных пластин Z 2

## Щ

щелевая маска /в цветном кинескопе/ S 66  
щелевая развертка S 14

## Э

экрано-масочный узел S 8

электроискровое легирование S 77  
электронная спектроскопия с угловым разрешением A 28  
электронно-лучевая адресация E 21  
электронно-лучевая имплантация примеси /из нанесенного на поверхность слоя/ E 22  
электронно-лучевая контактная печать E 25  
электронно-лучевое экспонирование E 1  
электронно-лучевой источник ионов E 24  
электронно-полупроводниковый прибор /семи-трон/ E 27  
электрооптическая выборка E 40  
электрооптический модулятор бегущей волны T 47  
электроэпитаксия E 17  
ЭЛТ бегущей волны T 45  
ЭЛТ с катодохромным экраном C 15  
ЭЛТ с лазерным экраном L 8  
ЭЛТ со сканированием бегущим лучем F 29  
эмиссия /горячих электронов/ в вакуум V 3  
эмиссия электронов со-  
провождения /при ион-  
ной бомбардировке ми-  
шени/ C 105  
энергетическая яма /кар-  
ман/ E 53  
эпитаксия атомарного  
слоя A 49

эпитаксия методом горячей стенки Н 23

эпитаксия с одновременным диффузионным легированием из сплава А 23

эпитаксия с электронно-лучевым экспонированием Е 23

эпитаксия, усиленная когерентной миграцией С 82

эпитаксия с использованием частично-ионизированного пучка молекул Р 2

ЭОП с микроканальной пластиной М 35

ЭОП с оптическим затвором L 37

ЭОП с секторным анодом Q 3

эффект квантового ограничения /квантово-ограниченный эффект/ Q 10

эффект переполнения /потенциальной ямы носителями/ С 10

эффект размерного квантования Q 15

---

ПМК ВИНТИ, I400IO, Люберцы-10, Моск. обл.,  
Октябрьский просп., 403

---

Тетр. новых терминов, № 183. Англо-рус. термины  
по оптоэлектронике, 1991, 1—84